

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/EP05/051057

International filing date: 09 March 2005 (09.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: EP
Number: 04005732.5
Filing date: 10 March 2004 (10.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 12 April 2005 (12.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

09.03.05

**Europäisches
Patentamt****European
Patent Office****Office européen
des brevets****Bescheinigung****Certificate****Attestation**

Die angehefteten Unterla-
gen stimmen mit der
ursprünglich eingereichten
Fassung der auf dem näch-
sten Blatt bezeichneten
europäischen Patentanmel-
dung überein.

The attached documents
are exact copies of the
European patent application
described on the following
page, as originally filed.

Les documents fixés à
cette attestation sont
conformes à la version
initialement déposée de
la demande de brevet
européen spécifiée à la
page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°

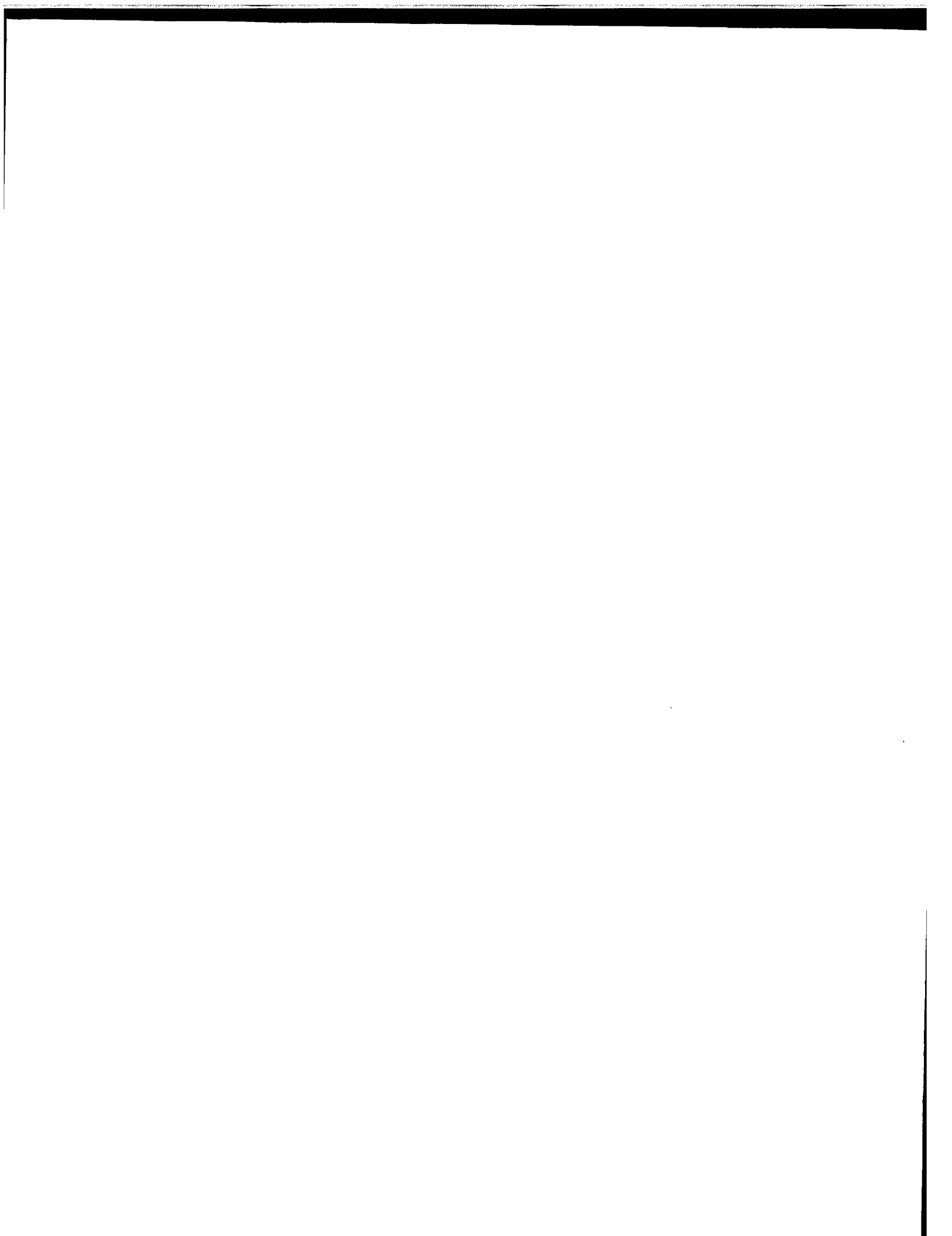
04005732.5

Der Präsident des Europäischen Patentamts;
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets
p.o.

R C van Dijk





Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

PCT/EP2005/051057

09.03.05

Anmeldung Nr:
Application no.: 04005732.5
Demande no:

Anmeldetag:
Date of filing: 10.03.04
Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

Diener&AG&Precision&Machining
Stationsstrasse 66
8424 Embrach
SUISSE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention:
(Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung.
If no title is shown please refer to the description.
Si aucun titre n'est indiqué se référer à la description.)

Verfahren und Abtastanordnung zum berührungslosen Abtasten dreidimensionaler
Objekte und Haltevorrichtung für Objekte

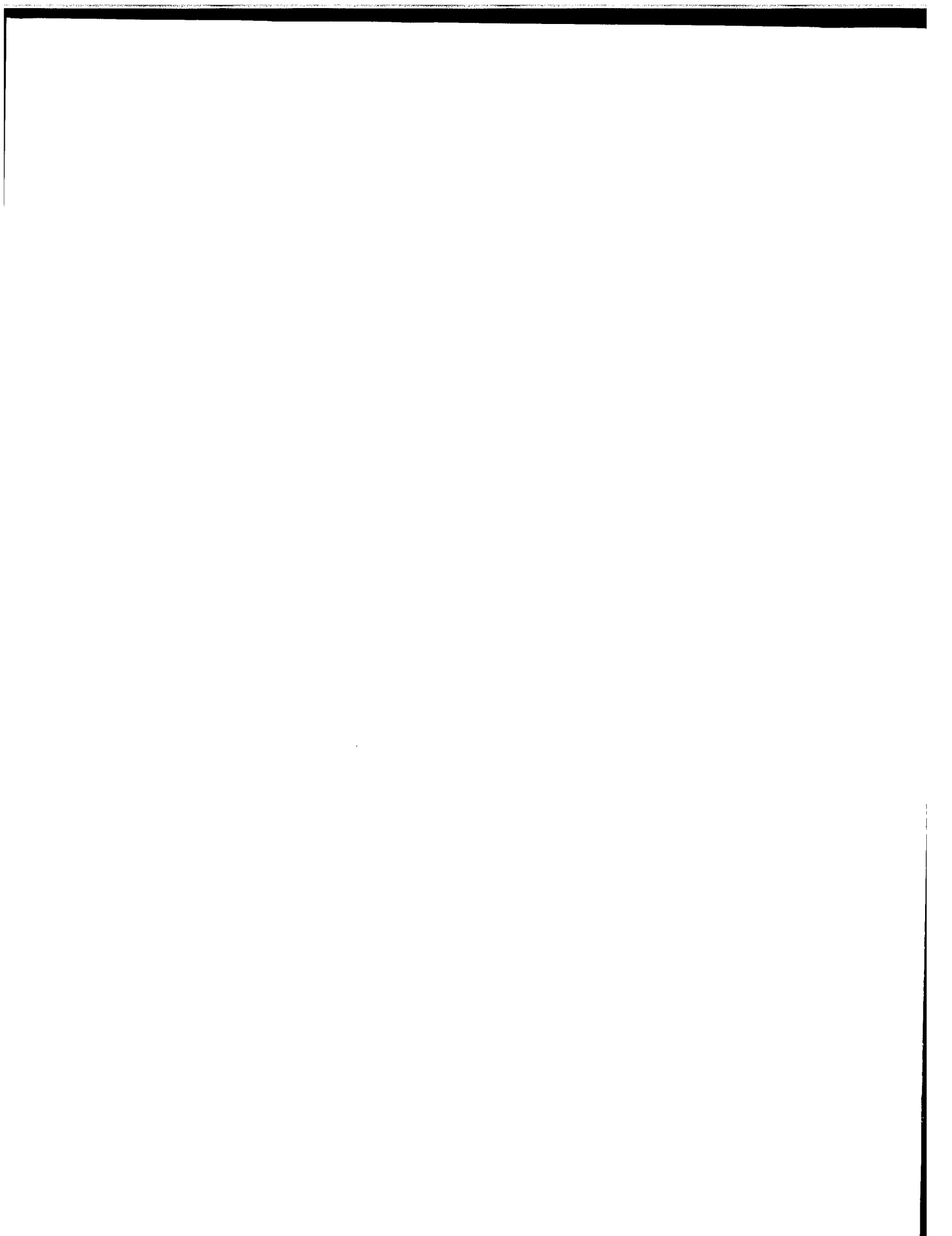
In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed /Priorité(s)
revendiquée(s)
Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/
Classification internationale des brevets:

G05B19/00

Am Anmeldetag benannte Vertragsstaaten/Contracting states designated at date of
filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL
PL PT RO SE SI SK TR LI



Verfahren und Abtastanordnung zum berührungslosen Abtasten dreidimensionaler Objekte und Haltevorrichtung für Objekte

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Abtastanordnung zum berührungslosen Abtasten von dreidimensionalen Objekten mittels Laserlicht und eine Haltevorrichtung für Objekte gemäss den unabhängigen Patentansprüchen.

Um dreidimensionale Objekte in digitaler Form darstellen zu können, werden Verfahren verwendet, die auf dem Abtasten der Objekte mit einem Lichtstrahl beruhen. Ein Beispiel findet sich in EP 671 679. Es wird ein Verfahren vorgestellt, bei dem das zu vermessende Objekt auf einem Drehteller um die vertikale Achse gedreht wird und dabei auf einer ringähnlichen Umfangslinie abgetastet wird. Nach jeder Umdrehung des Objekts wird der Abtastkopf in der Höhe bewegt, danach wird das Objekt auf einem nächsten Ring abgetastet. Zur Messung der Position eines Messpunktes wird eine optische Triangulation mit Hilfe von zwei Empfängerkameras durchgeführt.

Ein Problem beim Abtasten ergibt sich bei kompliziert geformten Objekten, die Hinterschneidungen aufweisen. Bei einer festen Einstellung des Lichtstrahls können diese üblicherweise nicht oder nur sehr unzureichend erfasst werden. In EP 671 679 ist der Abtastkopf deshalb einerseits in der horizontalen Ebene schwenkbar, so dass der Winkel, mit dem das Licht auf das Objekt trifft, in der horizontalen Ebene variiert werden kann. Andererseits kann der Abtastkopf auch in der vertikalen Ausrichtung gekippt werden, so dass der Winkel, unter dem das Licht auf das Objekt trifft, auch in vertikaler Richtung verändert werden kann.

Trotz diesen Lösungsansätzen können Hinterschneidungen zum Teil nicht erfasst werden. Ein weiteres Problem ist die Genauigkeit

PD1EN001EP / 10.03.04

2

PD1EN001EP-0400060

der Messung. Für eine zuverlässige Digitalisierung sollten die Messpunkte auf dem Objekt weniger als 0.4 mm, vorzugsweise weniger als 0.2 mm voneinander entfernt sein. Durch das ringweise Abtasten mittels Lichtstrahl und sequentiell Messen diskreter Lichtwerte entsteht ein Gittermuster von Messwerten, die aus den durch den Lichtstrahl definierten Linien auf dem Objekt verlaufen. Insbesondere bei unregelmässigen Oberflächen ist es schwierig, die erforderliche Dichte von Messpunkten zu erreichen. Um z.B. den Linienabstand zu halbieren, müsste der Höhenvorschub des Abtastkopfes ebenfalls halbiert werden. Dies führt zu aufwendiger Verstellmechanik, höherem Einfluss von mechanischen Toleranzen des Vorschubs und verlängerter Abtastzeit.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Nachteile des Bekannten zu überwinden, insbesondere Verfahren und Abtastanordnungen zum berührungslosen Abtasten dreidimensionaler Objekte zu schaffen, mittels welcher die Messgenauigkeit erhöht werden kann und Hinterschneidungen bei komplizierten Objekten zuverlässiger erfasst werden können. Weitere Aufgaben der Erfindung sind vor allem, die Abtastverfahren zu beschleunigen, zu vereinfachen und auch eine einfache und kostengünstige Konstruktion der Abtastanordnung zu ermöglichen.

Diese Aufgaben werden mit Verfahren und Abtastanordnungen und Haltevorrichtungen gemäss der Erfindung gelöst.

Beim Verfahren zum berührungslosen Abtasten von dreidimensionalen Objekten werden die Objekte mit einem gebündelten Lichtstrahl, vorzugsweise einem Laserstrahl abgetastet. Die Frequenz des Lichtstrahls kann sich sowohl im sichtbaren als auch im von Auge nicht wahrnehmbaren Bereich befinden.

FDIEN001EP / 10.03.04

3

PDIEN001EP-0400060

Beim vorliegenden Verfahren wird das Objekt in mindestens zwei unterschiedlichen Messabschnitten abgetastet. Ein Messabschnitt bezeichnet den Abtastvorgang eines vorbestimmten Bereichs des Objekts. Dieser Bereich wird an Messpunkten abgetastet, die auf einer oder mehreren Linien im Bereich liegen können. Ein Messabschnitt ist ein Abtastvorgang, bei dem während dem Abtasten die Art, wie der Lichtstrahl auf das Objekt trifft, nicht verändert wird. Soll das Objekt z.B. bei einem Messabschnitt rotieren, so rotiert es während dem gesamten Messabschnitt, und der Winkel des Lichteinfalls auf das Objekt wird nicht verändert.

Es ist möglich, dass der gleiche Bereich während mehreren Messabschnitten abgetastet wird, indem nach einem Messabschnitt die Einstellungen für Lichtstrahl und Objekt für den nächsten Messabschnitt geändert werden. Zum Beispiel kann der gleiche Bereich abgetastet werden, indem einmal das Objekt rotiert und einmal der Lichtstrahl über das Objekt bewegt wird.

Messpunkte sind jene Punkte auf der Oberfläche des Objekts, auf denen der abtastende Lichtstrahl auftrifft und das reflektierte Licht durch einen Lichtsensor bzw. eine Abtastvorrichtung gemessen wird. Durch die Messung wird die Position des Messpunktes bestimmt und zur digitalen Darstellung des Objekts berechnet und gespeichert. Die Entfernung eines Messpunktes von der Abtastanordnung lässt sich z.B. durch Auswertung mehrerer Messpunkte trigonometrisch berechnen. Bei handelsüblichen Empfängern, insbesondere CCD-Zeilen wird der Abstand eines Messpunktes unmittelbar ermittelt und ausgegeben.

Die Grösse eines Messpunktes hängt unter anderem von der Belichtungsdauer des Punktes ab, also der Zeitdauer, während welcher der reflektierte Lichtstrahl aufgenommen wird. Wenn mit einem kontinuierlichen Lichtstrahl abgetastet wird, so werden die

BDIEN001EP / 10.03.04

4

BDIEN001EP-0400060

Messpunkte z.B. mit einem Trigger in zeitlich konstanten Abständen erzeugt oder durch sequentielle, diskrete Messwerte eines Sensors dargestellt.

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung sind wenigstens zwei unterschiedliche Messabschnitte vorgesehen, die zu unterschiedlichen Gruppen oder „Wolken“ von Messpunkten führen, welche das Objekt repräsentieren und seine Abbildung ermöglichen. Das Objekt oder Teile des Objekts werden also wenigstens zweimal separat dargestellt. Die Messergebnisse der zwei oder mehr Messabschnitte werden anschliessend zusammengelegt.

Bei zwei unterschiedlichen Messabschnitten können die Linien der Messpunkte, die auf der Oberfläche des Objekts entstehen, nicht parallel sein. Alternativ oder zusätzlich kann das Objekt bei einem Messabschnitt rotieren und bei der anderen nicht. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt vor allem darin, dass sich die durch unterschiedliche Messabschnitte erzeugten Objektdarstellungen wechselseitig ergänzen. Wenn die Messpunkte der beiden Messabschnitte auf nicht parallelen Linien verlaufen, ergibt der zweite Messabschnitt Zwischen-Messpunkte auf Linien, die unter einem Winkel zu den Linien des ersten Messabschnitts verlaufen. Mathematisch bedeutet dies, dass dem ersten „Gitter“ von Messpunkten ein zweites, dazu im Winkels stehendes Gitter überlagert wird.

Eine Abbildung des stationären, also nicht rotierenden Objekts ergibt andere Messpunkte als die Abtastung eines rotierenden Objekts, bei dem die Abtastung in der Regel entlang einer spiralförmig über das Objekt laufenden Linie erzeugt wird. Dies kommt daher, dass der Lichtstrahl unter unterschiedlichen Winkeln zur Oberfläche auf das Objekt fällt, je nach dem, ob es rotiert oder

PD1EN001EP / 10.03.04

5

PD1EN001EP-0400060

nicht. Dadurch werden Zwischenpunkte erreicht und damit die Messlinien ergänzt.

Das Verfahren kann auch nur für Teilbereiche des Objekts angewendet werden. Dies ist z.B. dann von Vorteil, wenn bekannt ist, welche Partien des Objektes z.B. durch Hinterschneidungen oder andere Oberflächen-Unregelmässigkeiten schwierig zu erfassen sind. In einem solchen Fall kann dann z.B. das Objekt im ersten Messabschnitt in seiner Gesamtheit und beim zweiten Messabschnitt nur beschränkt auf einen Objektabschnitt erfasst werden. Wie bereits angeführt, liegt einer der wesentlichen Vorteile dieses Verfahrens darin, dass durch unterschiedliche Messabschnitte unterschiedliche Messpunkte auf der Oberfläche des Objekts dargestellt werden. Damit steigt die Auflösung der Darstellung des Objekts und die Messdauer wird verkürzt. Die Reihenfolge der Messabschnitte kann dabei gewählt werden. Wesentlich ist beim vorliegenden Verfahren, dass wenigstens zwei unterschiedliche Messabschnitte durchgeführt werden, deren das Objekt oder Teile des Objekts repräsentierende Messwerte zusammengelegt werden.

Die Messwerte der unterschiedlichen Messabschnitte werden anschliessend zu einer digitalen Darstellung des Objekts zusammengelegt, womit gemeint ist, dass die Messwerte der Messabschnitte in ein gemeinsames virtuelles Gitter eingetragen werden. Wenn viele Messwerte annähernd den gleichen Punkt beschreiben, so kann die Dichte der Messwerte im Gitter z.B. reduziert werden, indem die Positionen mehrerer benachbarter Punkte gemittelt werden. Eine andere Variante ist durch die Filterung der Messpunkte gegeben, wie weiter unten beschrieben ist.

Bisher hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn eine vorbestimmte Anzahl Messabschnitte durchgeführt wird, bevor die er-

Empf.zeit:10/03/2004 15:31

Empf.nr.:157 P.015

PD1EN001EP / 10.03.04

6

PD1EN001EP-0400060

haltenen Daten ausgewertet werden. Weiteres Abtasten des Objekts nach dieser Anzahl von Messabschnitten sollte nur noch in Ausnahmefällen notwendig sein. Die Anzahl und Art der Messabschnitte kann durch Erfahrungswerte optimiert werden, falls immer gleichartige Objekte (z.B. immer Ohr- oder Zahnabdrücke) abgetastet werden.

Es ist aber durchaus möglich, nach einer Basis von wenigstens zwei Messabschnitten die Messdaten auszuwerten und das Objekt gezielt in Bereichen mit fehlenden oder ungenügenden Messpunkten durch angepasste Messabschnitte weiter abzutasten. Bei einer guten Rechnerleistung kann sich dieses Vorgehen als sehr effizient erweisen.

In einer bevorzugten Ausführungsform wird der Lichtstrahl über eine Spiegelanordnung auf das Objekt gelenkt. Je nach Bauart der Anordnung ist es möglich, den Strahl z.B. durch verschiedene Spiegel oder einen oder mehrere schwenkbare Spiegel in verschiedenen Wegen und/oder unter verschiedenen Winkeln über das Objekt zu lenken. Zwei unterschiedliche Messabschnitte können z.B. erreicht werden, indem der Lichtstrahl über die Spiegelanordnung so über das Objekt gelenkt wird, dass die Messlinien nicht parallel sind. Der gleiche Effekt kann aber auch erzielt werden, wenn der Lichtsender und/oder der Lichtsensor (z.B. eine Kamera) relativ zum Objekt verstellbar angeordnet ist.

Es ist vorteilhaft, wenn das Objekt für einen neuen Messabschnitt gegenüber der Position eines früheren Messabschnitts gekippt wird. Das Objekt wird dann als gekippt betrachtet, wenn es um einen vorbestimmten Winkel von bevorzugt weniger als 90° , vorzugsweise etwa 10° bis 45° um eine Achse gedreht wird, die nicht ungefähr senkrecht zu den Messlinien des ersten Messabschnitts steht. Durch das Kippen entstehen bei einem folgenden Messab-

PDIEN001EP / 10.03.04

7

PDIEN001EP-0400060

schnitt nicht parallele Messlinien auf dem Objekt, auch wenn die Führung des Lichtstrahls nicht verändert wird.

Es ist möglich, dass das Objekt bei mindestens einem Messabschnitt um eine Drehachse rotiert. Dabei werden der einfallende Lichtstrahl und das Objekt so relativ zueinander bewegt, dass die Messpunkte entlang einer Linie auf der Oberfläche des Objekts liegen. Es ist dabei nicht von Bedeutung, ob der Lichtstrahl direkt von der Lichtquelle auf das Objekt gelangt, oder ob er über eine Spiegelanordnung darauf gelenkt wird. Vor allem lässt sich einfacher Aufbau der Auslenkanordnung verbunden mit grosser Messgenauigkeit erreichen, wenn der Lichtstrahl über wenigstens einen Spiegel auf das Objekt gelenkt wird. Dies vermeidet auch mechanische Belastung der Lichtquelle.

Wenn der Lichtstrahl und das rotierende Objekt in Richtung der Drehachse gegeneinander bewegt werden, entsteht eine spiralförmige Linie von Messpunkten auf der Oberfläche des Objekts.

Eine andere Möglichkeit, einen Messabschnitt durchzuführen, ist, den Lichtstrahl in ungefähr parallelen Linien über das nicht rotierende Objekt zu bewegen. Vorteilhaft wird dies erreicht, indem der Lichtstrahl über eine bewegliche, insbesondere eine rotierende Spiegelanordnung auf das Objekt gelenkt wird. Alternativ kann das auch erreicht werden, indem der Lichtsender beweglich angeordnet ist.

Wenn ein beweglicher Lichtsender verwendet wird, ist es günstiger, das Licht in Zickzack-Linien über das ruhende Objekt zu lenken. Dann können sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg des Lichtsenders Daten aufgenommen werden. Damit die gesamte dem Sender zugewandte Seite abgetastet wird, befinden sich die Umkehrpunkte der Zickzack-Linie vorzugsweise ausserhalb des Ob-

PDIEN001EP / 10.03.04

8

PDIEN001EP-0400060

jekts. Bei guter Vorkenntnis der Objektgrösse ist es aber auch möglich, die Umkehrpunkte auf dem Objekt abzubilden und in den Messabschnitt einzubeziehen. Um den Lichtstrahl über eine Spiegelanordnung in Zickzack-Linien über das Objekt zu lenken, kann beispielsweise ein oszillierender Spiegel verwendet werden.

Die Messgenauigkeit kann weiter erhöht werden, wenn der Lichtstrahl unter unterschiedlichen Winkeln zur Oberfläche auf das Objekt gelenkt wird. Dies kann sowohl bei gleichartigen als auch bei unterschiedlichen Messabschnitten gemacht werden. Es ist zum Beispiel vorteilhaft, dass das Licht über einen schwenkbaren Spiegel oder über mehrere, zueinander im Winkel stehende Spiegel auf das Objekt zu lenken. Ebenso ist es möglich, den Lichtsender schwenkbar zu befestigen, so dass der Lichtstrahl unter verschiedenen Winkeln auf das Objekt gelenkt wird.

Zur Referenzierung bei herkömmlichen Abtastverfahren wird von Zeit zu Zeit ein Eichobjekt auf dem Objekthalter angebracht; die beim Abtasten ermittelten Messwerte dieses Objekts werden zur Eichung des Geräts verwendet. Bei der Erfindung kann das Eichen des Gerätes entfallen. Statt dessen wird bei vorbestimmten Messabschnitten mindestens ein Referenzobjekt ausserhalb des Objektes zusätzlich zum Objekt mitabgetastet. Ein Referenzobjekt zeichnet sich dadurch aus, dass es eindeutig ist, und dass seine Position im Bezug zum Objekt bekannt oder berechenbar ist. Die Referenzierung kann zum Beispiel immer beim ersten Messabschnitt eines neuen Objekts gemacht werden. Das Abtasten der Referenzobjekte kann vor oder nach dem Abtasten des Objekts vorgenommen werden. Falls bekannt ist, wann die Referenzierung stattfindet, ist es auch möglich, dass die Referenzobjekte während einem Messabschnitt abgetastet werden.

PDIEN001EP / 10.03.04

9

PDIEN001EP-0400060

Vorteilhaft ist es, wenn bei jedem Messabschnitt, mindestens ein Referenzobjekt mitabgetastet wird. Dann steht jeder Messwert im Bezug zu einem oder mehreren Referenzwerten, wodurch sich die Genauigkeit der Bestimmung der durch die Messwerte repräsentierten Objektpunkte erhöht.

Die Anzahl der Referenzobjekte muss so gewählt sein, dass es bei bekannter Geometrie der Messanordnung und bei bekanntem Messvorgehen möglich ist, jedem Messpunkt eine Position im dreidimensionalen Raum zuzuordnen. Für eine zuverlässige Referenzierung ist es vorteilhaft, wenn sich in jeder Position bzw. bei jedem Messabschnitt Referenzobjekte im Blickfeld des Lichtstrahls befinden.

Es ist vorteilhaft, wenn ein Teil einer Haltevorrichtung für das Objekt zur Referenzierung verwendet wird, weil sich diese immer in der gleichen Position relativ zum Objekt befindet. Dazu können Teile der Haltevorrichtung eindeutig markiert werden, z.B. mittels vorstehenden oder rückspringenden Formen wie Kugelabschnitten, Ringen oder Kegelabschnitten. Es ist auch möglich, dass eine Phase, also eine Abschrägung an der Haltevorrichtung als Referenzobjekt dient.

Diese Art der Referenzierung hat sich als äusserst genau erwiesen. Sie kann vorteilhaft bei Verfahren eingesetzt werden, bei den Objekte oder Objektpunkte in einem Raum bestimmt oder gemessen werden sollen. Hauptvorteile dieser Methode sind abgesehen von der Genauigkeit der Messung auch die Einfachheit bei der Handhabung und die Geschwindigkeit, mit welcher das Objekt abgetastet werden kann. Wenn im Verlauf eines Messabschnitt wenigstens einmal ein Referenzobjekt abgetastet wird, können alle anderen Messwerte in sicheren Bezug zu den Referenzwerten gesetzt werden. Fehler in der Bewegung der Abtastmechanik, z.B. wenn die

FDIEN001EP / 10.03.04

10

FDIEN001EP-0400060

Haltevorrichtung beim Rotieren nicht rund läuft, können ausserdem erfasst und bei der Berechnung berücksichtigt werden.

Um Messwerte entsprechend ihrer Genauigkeit bearbeiten zu können, kann ein Hilfssignal erzeugt werden, welches Information über die Oberflächenbeschaffenheit des Objekts am Ort des auftreffenden Lichtstrahls und/oder über die Eigenschaften des auf dem Objekt auftreffenden Lichtstrahls enthält. Dies kann beispielsweise die Farbe und/oder die Reflektivität des Objektes betreffen oder die Form und/oder Grösse der beleuchteten Stelle auf dem Objekt. Das Hilfssignal kann mehrere dieser oder ähnlicher Informationen enthalten. Solche Hilfssignale lassen sich z.B. auf einfache Weise durch eine CCD-Kamera, vorteilhaft eine farbempfindliche CCD-Kamera ermitteln. Vorzugsweise wird jedem Messwert die zugehörige Information aus dem Hilfssignal zugeordnet.

Das Hilfssignal kann mit einem vorzugsweise farbempfindlichen Lichtempfänger, insbesondere einer Kamera erzeugt werden. Besonders bevorzugt sind zur Zeit der Anmeldung CCD-Kameras, weil diese viel Information erzeugen und weiterleiten können.

Messwerte werden können mit Hilfe der Information des Hilfssignals bearbeitet werden. Beispielsweise werden Messwerte verworfen, bei denen die Grösse und/oder Form des Lichtpunktes auf der Oberfläche des Objektes nicht einer vorbestimmten Norm genügen. Wenn z.B. ein Lichtstrahl das Objekt nur seitlich streift oder unter schrägem Einfallswinkel auftrifft, sind die Messwerte ungenau oder nicht verwertbar. Dies lässt sich z.B. aus der Form des reflektierten Bilds oder der Intensität des reflektierten Lichts schliessen. Da schwache reflektierte Signale auch z.B. durch einen Farbwechsel der Oberfläche des Objekts verursacht werden können, ist es vorteilhaft, wenn gleichzeitig Farbwerte

PDIEN001EP / 10.03.04

11

PDIEN001EP-0400060

als Hilfssignal berücksichtigt werden. Alternativ oder ergänzend können Messwerte auch aufgrund der Intensität des Messsignals verworfen werden. Ziel ist, die wegen zu schwachem Signal oder zu flachem Reflexionswinkel unsicheren Messwerte herauszufiltern und in der endgültigen Darstellung des Objektes nicht zu berücksichtigen.

Es ist vorteilhaft, die Belichtungszeit aufgrund der Oberflächeninformation zu verändern. Eine dunkle oder schlecht reflektierende Stelle des Objekts könnte länger belichtet werden als eine helle. Um die Messgenauigkeit beizubehalten, sollte die Geschwindigkeit, mit welcher der Lichtstrahl über das Objekt bewegt wird, der Belichtungszeit angepasst werden. Bei längerer Belichtungszeit muss das Objekt entsprechend langsamer bewegt werden.

Es ist auch möglich, die Lichtstärke des einfallenden Lichtstrahls aufgrund der Oberflächeninformation zu verändern. Zum Beispiel könnte die Lichtstärke erhöht werden, wenn der Lichtstrahl auf eine dunkle oder schlecht reflektierende Stelle des Objekts trifft.

Mit diesen Verfahren können zum Beispiel Schwankungen der Signalstärke des empfangenen Messsignals aufgrund von unterschiedlichen Reflektionswerten an der Oberfläche kompensiert werden. Unterschiedliche Reflexionswerte entstehen beispielsweise bei unterschiedlichen Farben, oder bei matten oder glänzenden Stellen auf dem Objekt. Fehler können durch die Korrektur der Messwerte in Abhängigkeit der Oberflächeneigenschaften reduziert werden.

Besonders vorteilhaft ist das Verfahren, wenn das Objekt mindestens einmal rotierend und mindestens einmal nicht rotierend ab-

PDIEN001EP / 10.03.04

12

PDIEN001EP-0400060

getastet wird und ausserdem bei einem Messabschnitt gegenüber der Position eines früheren Messabschnitts gekippt wird. Weiter ist es vorteilhaft, wenn der Lichtstrahl über eine drehbare Spiegelanordnung auf das Objekt gelenkt wird und bei jedem Messabschnitt ein Teil der Haltevorrichtung zur Referenzierung mitabgetastet wird. Dadurch erhöht sich die Messgenauigkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass Hinterschneidungen erfasst werden können.

Die Abtastanordnung zum berührungslosen Abtasten von dreidimensionalen Objekten umfasst einen Sender zum Aussenden von gebündelten Lichtstrahlen, insbesondere Laserstrahlen, und einen Empfänger zum Erfassen von Lichtsignalen. Weiter weist sie eine Haltevorrichtung zur Aufnahme des Objektes auf und ist mit einer Steuerungs- und Rechnungsanordnung verbunden oder verbindbar. Diese Steuerungs- und Rechnungsanordnung kann ein gewöhnlicher PC sein, es kann aber auch eine in der Anordnung eingebaute Rechneereinheit sein.

Es ist eine Auslenkanordnung zum Auslenken des Lichtstrahls über die Oberfläche des Objekts vorgesehen. Mit dieser Auslenkanordnung ist es möglich, das Objekt in mindestens zwei unterschiedlichen Messabschnitten abzutasten. Die Auslenkanordnung umfasst in bekannter Weise eine optische Anordnung zum Lenken eines Lichtstrahls auf das Objekt. Beispielsweise kann die Auslenkanordnung einen Bewegungsmechanismus für den Lichtsender oder für die Haltevorrichtung umfassen und/oder eine Spiegelanordnung zur Lenkung des Lichtstrahls oder zur Veränderung des Winkels relativ zu Objekt aufweisen.

Vorzugsweise ist die Haltevorrichtung für das Objekt um eine Drehachse drehbar. Damit kann das Objekt rotierend abgetastet werden.

In der Auslenkanordnung kann auch eine Anordnung zum Kippen des Objekts für einen Messabschnitt gegenüber der Position des Objekts bei einem früheren Messabschnitt vorgesehen sein. Dadurch wird auf einfache Weise erreicht, dass das Objekt durch zwei unterschiedliche Messabschnitte abgetastet werden kann. Diese Anordnung kann in der Haltevorrichtung für das Objekt eingebaut sein, so dass diese oder Teile davon mit dem Objekt mitgekippt werden.

Die Auslenkanordnung zum Auslenken des Lichtstrahls ist von Vorteil so gestaltet, dass die Haltevorrichtung und der einfallende Lichtstrahl derart gegeneinander bewegt werden können, dass das gesamte Objekt abgetastet werden kann. Dies ist möglich, indem die Haltevorrichtung bewegt wird und/oder indem der einfallende Lichtstrahl bewegt wird. Der einfallende Lichtstrahl kann vorteilhaft bewegt werden, indem der Sender beweglich angeordnet ist und/oder indem er über eine bewegliche Spiegelanordnung auf das Objekt gelenkt wird. Es ist nicht notwendig, dass bei jedem Messabschnitt das gesamte Objekt abgetastet wird, bei einem Messabschnitt kann auch nur ein bestimmter Bereich des Objekts abgetastet werden.

Besonders schnelle Abtastung ist möglich, wenn die Auslenkanordnung zum Lenken des Lichtstrahls in etwa parallelen Linien über das nicht rotierende Objekt vorgesehen ist. Dies wird vorteilhaft erreicht, indem der Lichtstrahl über einen beweglichen Spiegel auf das Objekt gelenkt wird; alternativ kann auch der Lichtsender beweglich angeordnet sein. Es ist auch denkbar, dass das Objekt bewegt wird.

Minimierung der Spiegelanordnung lässt sich z.B. erreichen, wenn der Lichtstrahl in zickzackförmigen Linien über das Objekt be-

PDIEN001EP / 10.03.04

14

PDIEN001EP-0400060

wegt wird, wobei die Umkehrpunkte der Zickzack-Linie nicht auf dem Objekt liegen müssen. Dies ist auch dann vorteilhaft, wenn der Lichtsender auf einer Schiene hin- und herbewegt wird, weil dann auf dem Hin- wie auf dem Rückweg des Senders gemessen werden kann. Wenn der Lichtstrahl über einen oszillierenden Spiegel auf das Objekt gelenkt wird, entstehen auch Zickzacklinien auf dem Objekt. Wird der Lichtstrahl jedoch über einen rotierenden Spiegel auf das Objekt geleitet, so sind etwa parallele Linien vorteilhafter, was schnelle Abtastung gewährleistet.

Vorteilhaft ist ausserdem eine Auslenkanordnung, die erlaubt, dass der Lichtstrahl unter unterschiedlichen Winkeln zur Oberfläche des Objekts auf das Objekt gelenkt wird. Damit kann die Messgenauigkeit erhöht werden. Vor allem lassen sich auch Hinterschneidungen des Objekts sicherer abbilden. Die Messlinien der Messabschnitte unter unterschiedlichen Winkeln können in etwa parallelen und in nicht parallelen Linien verlaufen. Die Linien können auch Kurven-Verlauf aufweisen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Objekte gekippt werden und rotieren, d.h. relativ zum Lichtstrahl „taumeln“. Messabschnitte unter unterschiedlichen Winkeln sind auch vorteilhaft, wenn das Objekt mehrmals hintereinander abgetastet wird, während es rotiert. In diesem Fall sind die Linien der einzelnen Messabschnitte etwa parallel.

Die Auslenkanordnung kann eine Spiegelanordnung zum Umlenken des Lichtstrahls auf das Objekt umfassen. Eine besondere Form einer Spiegelanordnung umfasst mehrere Spiegel, die um eine gemeinsame Achse drehbar angeordnet sind. Bei der Rotation gelangen sequentiell die verschiedenen Spiegel, z.B. mit unterschiedlichem Winkel in die Strahlenbahn der Lichtquelle. Eine solche Spiegelanordnung ist in einer Abtastanordnung wie oben beschrieben vorteilhaft, kann zum Abtasten in parallelen oder nicht-

parallelen und bei rotierenden und stillstehenden Objekten vorteilhaft eingesetzt werden oder generell für Abtast-Vorgänge mit Lichtstrahlen verwendet werden.

Vorteilhaft sind die Spiegel fest an der Spiegelanordnung befestigt, zumindest einige davon in unterschiedlichen Winkeln zur Drehachse. Je nach Wahl des Spiegels wird der Lichtstrahl unter einem anderen Winkel zur Oberfläche des Objekts auf das Objekt gelenkt. Besonders geeignet sind Spiegelneigungen von 120° bis 150° zur Drehachse, die Anordnung als ganzes hat die Form eines polygonalen Pyramidenstumpfs. Durch Drehen lässt sich jeweils der gewünschte Spiegel in seine Wirkposition bringen. Dabei kann der Spiegel bzw. die Drehachse sogar oszillierend verschwenkt werden, so dass der einzelne Spiegel linienförmig und in Zickzack-Form abtastet.

Wenn die gesamte Spiegelanordnung gedreht wird, wird der Lichtstrahl in Linien hintereinander mit unterschiedlichen oder gleichen Winkeln zur Oberfläche des Objektes über das Objekt gelenkt. Wenn zugleich die Spiegelanordnung und die Haltevorrichtung für das Objekt relativ zueinander bewegt werden, entstehen parallele Messlinien auf der Oberfläche des Objekts. Der grosse Vorteil dieser Spiegelanordnung ist, dass mit einem Messdurchgang, d.h. einmaligem Verschieben von Spiegelanordnung und Haltevorrichtung gegeneinander, mehrere Messabschnitte gemacht werden können, bei denen der Lichtstrahl unter unterschiedlichen Winkeln auf das Objekt gelenkt wird. Dadurch kann die gesamte Messdauer deutlich reduziert werden.

Besonders schnell kann die ein Messdurchgang mit einer solchen Anordnung stattfinden, wenn die Spiegel der Spiegelanordnung in wenigstens zwei identische Gruppen unterteilt sind, wobei innerhalb jeder Gruppe alle Spiegel unter unterschiedlichen Winkeln

PD1EN001EP / 10.03.04

16

PD1EN001EP-0400060

zur Drehachse befestigt sind und die Gruppen aufeinander folgend um die Drehachse angeordnet sind. Dies hat zur Folge, dass bei einer Umdrehung der Spiegelanordnung n -mal die gleiche Spiegelneigung in die Bahn des Lichtstrahl gelangt und das Objekt dadurch n -mal unter gleichen Winkel abgetastet wird, und zwar immer nach $360^\circ/n$ der Drehung der Spiegelanordnung. n ist dabei die Anzahl Gruppen. Dadurch lässt sich die Abtastgeschwindigkeit um den Faktor n pro Umdrehung des Spiegelhalters steigern. Die Anzahl n der identischen Gruppen sollte gegenüber der Grösse der Anordnung und der Anzahl verschiedener Spiegelneigungen optimiert werden. Bisher hat sich eine Anzahl n von 2 bis 3 als günstig erwiesen.

In einer weiteren Ausführungsform umfasst die Abtastanordnung eine Anordnung zum Erzeugen eines Hilfssignals, in welchem Information über Oberflächeneigenschaften des Objekts und/oder über die Eigenschaften des abtastenden Lichtstrahls auf dem Objekt in der Umgebung des Auftreffpunktes des Lichtstrahls auf dem Objekt enthalten ist. Diese Anordnung umfasst einen vorzugsweise farbempfindlichen Lichtempfänger, insbesondere eine Kamera. Besonders bevorzugt ist eine CCD-Kamera, da diese viel Information erzeugen und weiterleiten kann.

Die als Hilfssignal ausgewertete Information kann sich auf die Farbe und/oder Reflektivität, insbesondere den Grad der Mattheit der Oberfläche, beziehen, insbesondere in der Umgebung des auftreffenden Lichtstrahls. Die Information kann zusätzlich oder alternativ Auskunft über die Grösse und Form des die Oberfläche beleuchtenden Lichtstrahls beim Auftreffen auf die Oberfläche enthalten. Dies kann zum Beispiel mit einer oder mehreren Blenden erreicht werden.

Es ist möglich, dass das Messsignal und das Hilfssignal im gleichen Empfänger erfassbar sind. Dadurch können die Kosten der Anordnung reduziert werden.

Das Erzeugen und Anwenden eines solchen Hilfssignals lässt sich besonders vorteilhaft bei der erfindungsgemässen Abtastanordnung einsetzen, ist aber auch bei anderen Verfahren oder Scanner-Anordnungen zur Objektabtastung einsetzbar.

Es ist möglich, dass zur Referenzierung ein Referenzgegenstand auf dem Objekthalter plaziert und abgetastet wird. Die Abtastanordnung kann dabei auf die bekannten Dimensionen des Referenzgegenstandes geeicht werden. Vorteilhaft ist jedoch, wenn die Abtastanordnung selbst mindestens ein Referenzobjekt aufweist. Wie zuvor beschrieben, ist ein Referenzobjekt eindeutig und seine Position im Bezug zum Objekt ist bekannt oder berechenbar. Bei vorbestimmten Messabschnitten muss mindestens ein Referenzobjekt abtastbar sein.

Besonders vorteilhaft befindet sich mindestens ein Referenzobjekt auf der Haltevorrichtung. Dieser bewegt sich mit dem Objekt mit, was die Analyse der Position eines Messpunktes vereinfacht. Ausserdem können Fehler in der Bewegung berücksichtigt werden, z.B. wenn die Haltevorrichtung bei der Rotation nicht rund läuft.

Als Referenzobjekte können Teile der Haltevorrichtung eindeutig markiert werden, z.B. mittels vorstehenden oder eingedellten Formen wie Kugelabschnitten, Ringen oder Kegelstücken. Auch eine konische Fläche auf der Haltevorrichtung, z.B. eine Phase an einer Kante der Haltevorrichtung, kann als Referenzobjekt dienen. Es ist aber auch möglich, dass mindestens ein, vorzugsweise mehrere, zumindest teilweise kugelförmige Körper auf der Haltevor-

PDIEN001EP / 10.03.04

18

PDIEN001EP-0400060

richtung oder in der Abtastanordnung Referenzobjekte darstellen. Zur Referenzierung kann der Kugelmittelpunkt gewählt werden, der durch das Mitabtasten der Kugeloberfläche sehr genau berechnet werden kann.

Diese Art der Referenzierung ist nicht nur in einer Anordnung gemäss der vorliegenden Erfindung vorteilhaft, sondern kann für alle möglichen Bauarten von Abtastgeräten eingesetzt werden. Die Genauigkeit der Messung ist erhöht, wenn die Referenzierung nicht über eine Eichung stattfindet, sondern über in der Abtastanordnung enthaltene Referenzobjekte, wobei die realen Messwerte eines Objektes im Verlauf des Messabschnitts mit den Messwerten der Referenzobjekte in Bezug gesetzt werden können.

Es ist vorteilhaft, wenn die Haltevorrichtung für das Objekt um eine Drehachse drehbar ist und eine Halteanordnung für das Objekt aufweist. Diese Halteanordnung besteht vorzugsweise aus einem Haltetisch und einer Achse, andere Anordnungen sind aber ebenfalls denkbar.

Weiter umfasst die Haltevorrichtung eine Kipp-Vorrichtung zum Kippen der Halteanordnung gegenüber der Drehachse um einen vorbestimmbaren Winkel. Diese Kipp-Vorrichtung weist eine Umschaltanordnung auf, mit der die Halteanordnung zwischen verschiedenen Positionen verlagert wird. Die Umschaltanordnung umfasst ein Betätigungselement, das durch das Drehen der Haltevorrichtung betätigt wird. Dieses Betätigungselement ist vorzugsweise ein Hebel, über die Halteanordnung hinausragt und an mit beweglichen Anschlag in Eingriff bringbar ist, um durch einfaches Drehen der Haltevorrichtung die Kippbewegung auszulösen.

Besonders vorteilhaft ist die Haltevorrichtung in verschiedene Richtungen relativ zur Abtastanordnung kippbar. Dadurch ist es

möglich, Hinterschneidungen mit unterschiedlichen Blickwinkeln abzutasten, wodurch die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, die gesamte Oberfläche des Objekts zu erfassen.

Die Halteanordnung kann eine gerade Achse aufweisen, die in einer Aufnahmeanordnung allseitig schwenkbar gelagert ist. Diese Aufnahmeanordnung besteht vorteilhaft aus einer Kugel und einem Gegenlager, in welchem die Kugel gelagert ist. Die Kugel kann z.B. durch eine Feder im Gegenlager gehalten werden. Diese Form der Aufnahmeanordnung hat den Vorteil, dass das Objekt beim Kippen nicht zugleich abgesenkt wird.

Diese Art der Haltevorrichtung kann besonders vorteilhaft in einer Abtastanordnung gemäss der vorliegenden Erfindung eingesetzt werden.

Das Verfahren und die Abtastanordnung gemäss der vorliegenden Erfindung kann in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen zum Einsatz gelangen. Zum Beispiel können Abdrücke von Zähnen oder Gehörgängen digital dargestellt werden, womit die Herstellung von Zahnprothesen oder Hörgeräten vereinfacht und beschleunigt werden kann. Das Verfahren und die Anordnung sind aber auch geeignet, um digitale Darstellungen von Bauteilen aus der Mechanik zu erhalten, insbesondere von Präzisionsteilen und Teilen, die in kleiner Stückzahl hergestellt werden. Die Liste der Anwendungsbereiche könnte beliebig verlängert werden. Das Verfahren und die Anordnung kommen also überall zum Einsatz, wo digitale Abbildungen von dreidimensionalen Objekten erstellt werden sollen.

Im folgenden wird die Erfindung an verschiedenen Ausführungsbeispielen mit Figuren erläutert. Es zeigt

- Fig. 1a: eine schematische Ansicht der gesamten Abtastanordnung,
Fig. 1b: schematische Draufsicht der Abtastanordnung gemäss Fig. 1a
Fig. 2: eine alternative Abtastanordnung in einer schematischen Ansicht,
Fig. 3a: eine perspektivische Ansicht einer Spiegelanordnung,
Fig. 3b: eine schematische Draufsicht auf die Spiegelanordnung gemäss Fig. 3a,
Fig. 3c: eine schematische Seitenansicht eines Objekts und der Laserlichtstrahlen, die über unterschiedliche Spiegel der Anordnung gemäss Fig. 3a unter unterschiedlichen Winkeln auf das Objekt treffen,
Fig. 4a bis 4e: eine Ausführungsform einer Haltevorrichtung in verschiedenen Stellungen,
Fig. 5a bis 5c: eine alternative Ausführungsform einer Haltevorrichtung in verschiedenen Stellungen,
Fig. 6: eine schematische Draufsicht auf ein Objekt und Laserlichtstrahlen während dem Abtasten des rotierenden Objekts,
Fig. 7: eine schematische Draufsicht auf ein Objekt und Laserlichtstrahlen während dem linienförmigen Abtasten,
Fig. 8a bis 8d: eine schematische Seitenansicht eines Objekts mit nicht parallelen Messlinien,
Fig. 9a bis 9d: verschiedene Arten von Referenzobjekten, und
Fig. 10: ein Flussdiagramm zum Bearbeiten von Messwerten

Eine Ausführungsform der erfindungsgemässen Abtastanordnung ist in Fig. 1a und 1b dargestellt. Objekt 1, Lichtsender 2 und Lichtempfänger 3 befinden sich ungefähr auf der gleichen Höhe. Das Objekt 1 ist auf einer Haltevorrichtung 4 befestigt, die mittels Antrieb M1 um die Achse A1 drehbar ist und mittels Antrieb M2 entlang der Achse A1 in der Höhe bewegt werden kann,

was mit gestrichelten Linien angedeutet ist. Ausserdem kann die Haltevorrichtung 4 mittels Antrieb M3 gegenüber der Drehachse A1 um den Winkel φ gekippt werden. Die Antriebe M1 bis M3 sind durch Leitungen L1 bis L3 und mit dem Interface 6a mit einer Steuerungs- und Rechnungseinheit 6 verbunden und durch diese ansteuerbar.

Der Lichtsender 2 und der Lichtempfänger 3 sind miteinander verbunden und bilden eine Sender-Empfänger-Einheit 23. Dadurch wird der Winkel β , der zwischen dem ausgesandten Lichtstrahl 7 und dem reflektierten Lichtstrahl 8 liegt, möglichst klein gehalten. Kleine Winkel β sind vorteilhaft, weil die Intensität des Reflexionsstrahls 8 dann am grössten ist, wenn der Einfallswinkel des Lichtes auf das Objekt nahe bei 90° liegt. Somit wird bei kleinem Winkel β eine möglichst grosse Lichtintensität des reflektierten Lichtstrahls gemessen. Ausserdem werden bei einem kleinen Winkel β Hinterschneidungen besser erfasst; zum Erfassen eines Datenpunktes darf weder der einfallende Strahl 7 noch der reflektierte Strahl 8 von einer Hinterschneidung abgeschnitten werden.

Die Sender-Empfänger-Einheit 23 ist mittels Antrieb M4 um die zur Bildebene senkrecht stehende Achse A3 bzw. die Schiene 23a (Fig. 1b) schwenkbar und entlang der Schiene 23a verschiebbar. Die Schiene 23 ist nicht zwingendermassen gerade, wie hier dargestellt, sondern kann auch gebogen sein, z.B. auf einem Kreisabschnitt um das Objekt 4 liegen.

Beim Schwenken um die Achse A3 ist es möglich, dass die Sender-Empfänger-Einheit 23 mittels Antrieb M4 kontinuierlich verstellt und in beliebigen Positionen arretiert wird. Es ist aber auch denkbar, dass die Sender-Empfänger-Einheit 23 in vorbestimmten Winkelpositionen einrastet. Entlang der Schiene 23a ist die Sen-

PDIEN001EP / 10.03.04

22

PDIEN001EP-0400060

der-Empfänger-Einheit 23 vorteilhaft kontinuierlich durch den Antrieb M4 verschiebbar, z.B. mit einem Linearmotor. Selbstverständlich ist aber auch ein Schrittmotor oder ein Servomotor denkbar. Der Antrieb M4 ist durch die Leitung L4 und das Interface 6a ebenfalls mit der Steuerungs- und Rechnungseinheit 6 verbunden und wird durch diese gesteuert.

Sowohl der Lichtsender 2 als auch der Lichtempfänger sind mit der Steuerungs- und Rechnungseinheit 6 verbunden. Die Steuerungs- und Rechnungseinheit 6 ist in diesem Beispiel ein handelsüblicher Computer, auf dem ein entsprechendes Software-Produkt installiert ist. Der Computer kann mitgeliefert oder vom Anwender selbst angeschlossen werden.

Von der Steuerungs- und Rechnungseinheit 6 aus wird die Position der Haltevorrichtung 4 und der Sender-Empfänger-Einheit 23 durch Ansteuerung der Antriebe M1 bis M4 gelenkt und kontrolliert. Die vom Empfänger 3 erhaltenen Daten werden durch eine Verbindungsleitung 10 an die Steuerungs- und Rechnungseinheit 6 abgegeben und dort gespeichert und ausgewertet. Die Steuerungs- und Rechnungseinheit 6 ist mit einem Bildschirm 9 verbunden, auf dem die digitale Darstellung des Objekts 1 sichtbar gemacht wird. Es ist auch möglich, dass die Steuerungs- und Rechnungseinheit 6 mit einer Fräsmaschine oder dergleichen verbunden ist, um eine dreidimensionale Kopie des Objekts anzufertigen.

Zum Messen wird das Objekt 1 bei mindestens einem Messabschnitt um die Achse A1 rotiert und entlang der Achse A1 in Richtung des Pfeils bewegt, während die Sender-Empfänger-Einheit 23 in einer festen Position ruht. So entsteht durch den Lichtstrahl 7,8 und die vom Lichtempfänger 3 gemessenen Messwerte eine fortlaufende Linie von Messpunkten auf der Oberfläche des Objekts 1. Wenn das Objekt 1 entlang der Achse A1 ausgerichtet ist, winden sich die

Messpunkte spiralförmig um das Objekt 1. Wird das Objekt 1 vor dem Messabschnitt gegenüber der Achse A1 um den Winkel φ gekippt, so beschreiben die Messpunkte eine fortlaufende Schlangenlinie auf der Oberfläche des Objekts 1.

Wenn das Objekt abgetastet wird, ohne zu rotieren, so wird die Sender-Empfänger-Einheit 23 zum Messen entlang der Achse A3 bewegt (Fig. 1b). Das Objekt wird entlang der Achse A1 bewegt. Eine Seite des Objekts wird dann mit parallel einfallenden Lichtstrahlen 7 abgetastet. Es wird sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg der Sender-Empfänger-Einheit 23 abgetastet, was dazu führt, dass das Objekt mit einer zickzackförmigen Linie abgetastet wird. Wenn hingegen nur gemessen würde, wenn die Einheit 23 in eine Richtung bewegt wird, so würden parallele Linien auf der Oberfläche des Objekts entstehen.

In Fig. 2 ist eine weitere mögliche Ausführungsform der erfindungsgemässen Abtastanordnung schematisch dargestellt. In dieser Ausführungsform ist der Laserlichtsender 2 fest montiert und sendet das Licht etwa vertikal nach unten aus. Der Lichtstrahl 7 wird über eine Spiegelanordnung 5 auf das Objekt 1 gelenkt. Ein Anteil des reflektierten Lichtes gelangt ebenfalls über die Spiegelanordnung 5 in den Empfänger 3, der mit der Steuerungs- und Rechnungseinheit 6 in Verbindung steht. Die vom Empfänger 3 erhaltenen Daten werden in der Einheit 6 gespeichert und weiterverarbeitet. Die Steuerungs- und Rechnungseinheit 6 ist in diesem Fall ein fest in der Anordnung integrierter Rechner, der mit einem externen Computer verbunden werden kann. Die Ansteuerung der Steuerungs- und Rechnungseinheit 6 erfolgt dann über den externen Computer. Die erfassten Messdaten werden in der Einheit 6 ausgewertet, über den externen Computer wird dem Benutzer Zugriff auf die ausgewerteten Daten gewährt.

Eine farbempfindliche CCD-Kamera 3' tastet analog dem Empfänger 3 die Oberfläche des Objekts 1 ab, die vom Lichtstrahl 7 beleuchtet wird. Die Kamera 3' erzeugt ein Hilfssignal, welches Information über die Oberflächenbeschaffenheit und über die Form und Grösse des Lichtpunktes auf dem Objekt enthält. Insbesondere sind das Werte über die Farbe, Helligkeit, Reflektivität und Mattheit der Oberfläche des Objekts in der Umgebung des Lichtpunkts, sowie die Abweichung der Kreisform und die Grösse des Lichtpunkts selbst.

Der Empfänger 3 ist direkt neben dem Sender 2 angeordnet, so dass das reflektierte Licht 8 über die Spiegelanordnung 5 in den Empfänger 3 und die Kamera 3' gelenkt wird. Das ist möglich, weil die Reflexion diffus in alle Richtungen stattfindet. Da die Empfänger 3 und 3' gleich weit vom Sender 2 entfernt sind, wird in beiden Empfängern 3 und 3' etwa gleich viel Licht empfangen. Der in den Empfänger 3' reflektierte Lichtstrahl 8' ist gepunktet dargestellt. Die Positionierung des Empfängers 3' ist ebenfalls nicht einschränkend zu verstehen, der Empfänger 3' könnte auch anders plazierte werden. Wesentlich ist, dass der Empfänger 3' die für das Hilfssignal notwendige Information erfassen kann.

Da der Sender 2 und der Empfänger 3 unmittelbar nebeneinander angeordnet sind, wird der Winkel β zwischen dem ausgesandten Lichtstrahl 7 und dem reflektierten Lichtstrahl 8 klein gehalten. Es ist ausserdem vorteilhaft, dass beide Strahlen 7 und 8 über die Spiegelanordnung gelenkt werden, weil somit der ausgesandte Strahl 7 und der reflektierte Strahl 8 den gleichen Bedingungen unterworfen sind. Alternativ könnte der Empfänger 3 auch auf der gleichen Höhe wie das Objekt 1 angeordnet sein, wobei darauf zu achten wäre, dass er nicht im Schatten der Spiegelanordnung 5 steht. So könnte der Winkel β ebenfalls klein gehalten werden.

Das Objekt 1 wird von der Haltevorrichtung 4 gehalten. Die Haltevorrichtung 4 ist um die Achse A1 drehbar. Das Objekt 1 ist ausserdem gegenüber der Achse A1 um einen Winkel ϕ kippbar, was mit gestrichelten Linien angedeutet ist.

Die Spiegelanordnung 5 ist mittels Antrieb M5 um die Achse A2 drehbar und Mittels Antrieb M6 entlang der Achse A2 in der Höhe verstellbar. Die Antriebe M5 und M6 sind durch die Leitungen L5 und L6 mit der Steuerungs- und Rechnungsanordnung 6 verbunden. Mit gestrichelten Linien ist die Spiegelanordnung 5 dargestellt, nachdem sie in der Höhe verstellt wurde und ein anderer Spiegel S ausgewählt wurde, mit welchem der Lichtstrahl 7 von oben auf das Objekt 1 gelenkt wird.

Die Anordnung der Spiegel S1 bis S4 ist im Zusammenhang mit Fig. 3 näher erläutert. Der Lichtstrahl 7 wird wie in Fig. 3c dargestellt in verschiedenen Höhen auf das Objekt gelenkt. Alternativ wäre es auch möglich, dass statt der Spiegelanordnung 5 die Haltevorrichtung 4 in der Höhe verstellbar angeordnet wird. Statt einer solchen Anordnung mehrerer Spiegel könnte auch eine andere Anordnung gewählt werden. Es kann zum Beispiel ein einzelner Spiegel verwendet werden, der an einem Gelenk befestigt ist und in verschiedene Richtungen bewegt werden kann. Ein grosser Vorteil der gezeigten Anordnung ist deren Stabilität, sowie die Geschwindigkeit der Abtastung unter verschiedenen Winkeln und aus verschiedenen Spiegelpositionen, um Hinterschneidungen auszu-leuchten.

Gemäss Fig. 3a und 3b sind acht Spiegel S1 bis S4 kegelförmig um die Drehachse A2 herum angeordnet. Jeweils zwei gegenüberliegende Spiegel weisen die gleiche Neigung γ auf. Die Neigungswinkel γ können beliebig gewählt werden; bei senkrechtem Lichteinfall ha-

FDIEN001EP / 10.03.04

26

FDIEN001EP-0400060

ben sich Winkel im Bereich von 120° bis 150° als vorteilhaft erwiesen. Durch die unterschiedlichen Neigungen der Spiegel S wird der Lichtstrahl 7 je nach dem welcher Spiegel sich im Strahlengang 7,8 befindet unter unterschiedlichen Winkeln α auf das Objekt 1 gelenkt, wie in Fig. 3c dargestellt. In den einzelnen Teilbildern befindet sich jeweils ein anderer Der Spiegel S1 bis S4 im Strahlengang 7,8. Bei Neigungswinkeln γ von über als 135° trifft der Lichtstrahl 7 von oben auf das Objekt 1 auf, bei unter 135° von unten, und bei 135° trifft der Lichtstrahl genau horizontal^o auf das Objekt 1 auf. Dadurch können verschiedene Bereiche des Objekts 1 abgetastet werden, oder der gleiche Bereich unter unterschiedlichen Winkeln.

Bei sehr flachen Lichteinfall wird der Lichtpunkt auf dem Objekt 1 stark oval, die Intensität des reflektierten Strahls 8 wird klein. Solche Punkte können wegen ihrer grösseren Fehleranfälligkeit verworfen werden. Dies ist im Zusammenhang mit dem Flussdiagramm in Fig. 10 genauer erläutert.

Durch Rotation der Haltevorrichtung 4 wird das Objekt 1 um die eigene Achse gedreht und auf Punkten der Umfangslinie abgetastet. Wird zugleich die Höhe der Spiegelanordnung verändert, so entsteht beim Abtasten eine spiralförmige Linie von Messpunkten um das Objekt 1, wie in Fig. 8a dargestellt. Der Abstand der Spiralwindungen hängt von der Vorschubgeschwindigkeit der Höhenverstellung durch Antrieb M6 (Fig. 2) ab. Wie dicht die Messpunkte aneinander liegen, wird durch die Rotationsgeschwindigkeit der Haltevorrichtung 4 bestimmt. Damit ein zuverlässiges dreidimensionales Bild aus den Messpunkten hergestellt werden kann, sollten die Messpunkte nicht mehr als 0.4 mm voneinander entfernt sein. Dies ist bei einfachen Formen des Objekts mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 2.5 Umdrehungen pro Sekunde und einem Höhenvorschub von 0.3 mm pro Umdrehung möglich. Diese An-

gaben dienen nur der Erläuterung und sind nicht einschränkend zu verstehen.

Fig. 8b zeigt das Objekt für einen folgenden Messabschnitt um den Winkel ϕ gekippt (Fig. 1a und 2). Statt der spiralförmigen Linie, gemäss Fig. 8a entsteht eine taumelnde Schlangenlinie auf der Oberfläche des Objekts. Die Messlinien der beiden Messabschnitte sind dann auf jeden Fall nicht parallel.

Bei einem folgenden Messabschnitt wird das Objekt 1 stationär in verschiedenen Positionen abgetastet. Dabei werden ausgewählte Seiten des Objekts 1 während den Messabschnitten abgetastet, indem die Spiegelanordnung rotiert wird (Fig. 2 und 3). Dadurch wird der Strahl 7 linienförmig unter verschiedenen Winkeln α auf das Objekt 1 auftreffend über die der Spiegelanordnung 5 zugewandte Seite des Objekts 1 gelenkt. Die Geometrie der Spiegelanordnung 5 erlaubt, dass das Objekt 1 unter allen vorbestimmten Einfallswinkeln α beim einmaligen Abfahren der Höhe abgetastet wird. Dadurch kann gegenüber einer Anordnung, bei der die Höhe pro Winkel abgetastet werden muss, viel Zeit eingespart werden. Da immer zwei gegenüberliegende Spiegel S mit dem gleichen Neigungswinkel γ angebracht sind (Fig. 3b), ist es ausserdem möglich, die Spiegelanordnung 5 bei gleicher Drehzahl doppelt so schnell in der Höhe zu verschieben, wie wenn lauter unterschiedliche Spiegelneigungen eingestellt sind, ohne dass dabei die Messgenauigkeit abnimmt. Damit wird die Dauer des Abtastvorganges weiter verkürzt.

Eine Ausführungsform einer Haltevorrichtung 4 in den Fig. 4a bis 4e dargestellt. Fig. 4a zeigt eine Seitenansicht der Haltevorrichtung 4. Der obere Teil der Haltevorrichtung 4 ist gegenüber einer Grundplatte 48 mittels Antrieb M1 um die Achse A1 drehbar. In einem Gehäuse 49 befinden sich ein nicht dargestelltes Kugel-

PDIE001EP / 10.03.04

28

PDIE001EP-0400060

lager und eine ebenfalls nicht dargestellte Zahnradverbindung, über welche die Haltevorrichtung 4 mit dem Antrieb M1 verbunden ist. Das Objekt 1 wird auf einem Haltetisch 40a befestigt. Dieser Haltetisch 40a befindet sich auf einer Achse 40 und wird mit Federstahl-Streifen 44 in Position gehalten. Die Federstahl-Streifen 44 sind an einer Stützplatte 43 befestigt (Fig. 4c).

Die Stützplatte 43 ist über Gleitlager-Körper 45 mit einer weiteren Stützplatte 42 verbunden. Am Ende der Achse 40 ist ein Kugelrad 41 befestigt, das in einer Ausnehmung 46 der Stützplatte 42 läuft.

Die Achse 40 kann in der Ausnehmung 46 zwei Positionen annehmen: entweder sie steht senkrecht, d.h. parallel zur Drehachse A1 (mit ausgezogener Linie dargestellt), oder sie wird gegenüber der Drehachse A1 um den Winkel φ gekippt. Da das Rad 41 in der Ausnehmung 46 läuft, senkt sich das Objekt 1 durch das Kippen leicht ab. Die Kippbewegung wird mit einem Hebel 47 (Fig. 4b, 4c). Der Hebel 47 befindet sich zwischen den beiden Stützplatten 42 und 43 und ist an der Platte 42 um den Drehpunkt 47a verschwenkbar befestigt.

Eine Variante der Haltevorrichtung 4, bei der das Objekt nicht abgesenkt wird, ist weiter unten im Zusammenhang mit den Figuren 4d und 4e erläutert.

Der Hebel 47 wird mit einem Anschlag 50 betätigt, der mittels Antrieb M3 bewegt wird. Der Antrieb M3 ist ein Elektro-Hubmotor und der Anschlag 50 wird vertikal, also parallel zur Achse A1 bewegt. Zwei Positionen des Anschlags 50 sind Fig. 4a zu entnehmen. Mit ausgezogener Linie ist die Ruheposition dargestellt, der Anschlag 50 befindet sich unterhalb der Stützplatte 42. Mit gestrichelter Linie ist die Position dargestellt, in welcher der

Hebel 47 betätigt werden kann. Der Anschlag 50 befindet sich von der Höhe her zwischen den beiden Platten 42 und 43, in der horizontalen Ebene ist er gemäss Fig. 4b neben den Stützplatten 42, 43 angeordnet.

In Fig. 4b ist die Platte 43 von unten abgebildet. Der Hebel 47 ist an der nicht sichtbaren Platte 42 befestigt.

Der Hebel 47 steht über die beiden Stützplatten 42 und 43 hinaus. Wenn der Anschlag 50 auf die Höhe des Hebels 47 gebracht wird (in Fig. 4a mit gestrichelten Linien dargestellt), und die Haltevorrichtung 4 mittels Antrieb M1 gedreht wird, wird der Hebel 47 durch den Anschlag 50 festgehalten. Wenn sich im Ablauf der Rotation die Stützplatte 43 weiterdreht, bringt der Hebel 47 die Achse 40 von der vertikalen Position (ausgezogene Linie) in die gekippte Position (gestrichelte Linie). Das Kippen des Objekts 1 wird also durch die Einstellung der Höhe für den Anschlag 50 mittels Antrieb M3 und beim Drehen der Haltevorrichtung 4 mittels Antrieb M1 erreicht.

Damit das Objekt 1 in verschiedene Richtungen relativ zur Drehachse A1 gekippt werden kann, ist die Stützplatte 43 mit den Federstahl-Streifen 44 und der Achse 40 gegenüber der Stützplatte 42 drehbar. Die Stützplatte 43 ist dazu auf Gleitlager-Körper 45 angeordnet und weist eine passende ringförmige Fuge 45a auf, in der die Lager-Körper 45 laufen. Die achteckige Grundform der Stützplatte 43 ist rein beispielhaft zu verstehen, andere Grundformen können ebenfalls zum gleichen Zweck verwendet werden.

Wenn sich die Achse 40 in der vertikalen Position befindet, also parallel zur Drehachse A1 ist, kann der Anschlag 50 auf die Höhe der Stützplatte 43 gebracht werden und die Haltevorrichtung mittels Antrieb M1 um die Achse A1 gedreht werden. Sobald die An-

PDIEN001EP / 10.03.04

30

PDIEN001EP-0400060

schlagkante 51 auf den Anschlag 50 stösst, werden die Stützplatte 43 und die daran befestigten Elemente 40, 40a und 44 gegenüber der Stützplatte 42 und der Ausnehmung 46 verdreht. Da mittels Antrieb M1 eine kontinuierliche Drehung möglich ist, kann die Stützplatte 43 um jeden beliebigen Winkel gegenüber der Stützplatte 42 verdreht werden.

Wenn der Antrieb M1 angehalten und der Anschlag 50 abgesenkt wird, ist die neue Winkelstellung der Platten 43 und 42 gegeneinander fixiert. Dies kommt daher, dass die Gleitlager-Körper 45 in der Fuge 45a einen so grossen Reibwiderstand aufweisen, dass sich die Platte 43 ohne äussere Einflüsse nicht gegen die Platte 42 dreht. Wenn nun erneut der Hebel 47 betätigt wird und die Achse 40 in die gekippte Position gebracht wird, so wird das Objekt 1 zwar wieder um den gleichen Winkel ϕ gekippt, die Kipp-richtung ist aber eine andere. Da die Platten 42 und 43 um beliebige Winkel gegeneinander gedreht werden können, kann der Haltetisch 40a mit dem Objekt 1 in beliebige Richtungen um den Winkel ϕ gekippt werden.

Statt dass die Achse 40 aufgerichtet wird, wenn das Objekt 1 in eine andere Richtung gekippt werden soll, können die Platten 42 und 43 mit dem oben beschriebenen Mechanismus auch gegeneinander verdreht werden, während sich die Achse 40 in der gekippten Position befindet. Dies ist vom Bewegungsablauf her günstiger, weil die Achse 40 nur einmal gekippt werden muss, die Wirkung ist aber die gleiche: die Achse 40 wird relativ zur Abtastanordnung, insbesondere relativ zum einfallenden Lichtstrahl 7, in verschiedene Richtungen gekippt.

Der Hauptvorteil einer solchen Haltevorrichtung 4 ist, dass das Objekt in alle gewünschten Richtungen relativ zur Drehachse A1 um den Winkel ϕ gekippt werden kann, wobei die Herstellungsko-

sten der Haltevorrichtung niedrig sind. Wenn im Hinblick auf das Messverfahren vermieden werden soll, dass das Objekt beim Kippen abgesenkt wird, lässt sich dies mit der Ausführungsform gemäss Fig. 4d und 4e erreichen.

Statt mit den Federstahl-Streifen 44 wird die Achse 40 mit einer konisch zulaufenden Kopfplatte 52 fixiert. Diese Kopfplatte 52 ist fest auf der Platte 43 befestigt und weist eine kegelförmige Öffnung 54 für die Achse 40 auf. Die Achse 40 ist mit einer Kugel 53 in dieser Öffnung 54 fixiert. Die Kugel 53 wird mit einer Feder 53a in der kegelförmigen Öffnung 54 hoch gedrückt. Wenn nun die Achse 40 gekippt wird, beschreibt er eine Pendelbewegung in welcher er durch Anschlagzylinder 55 begrenzt wird. Dazu ist das Rad 41 durch den Anschlagkörper 57 ersetzt worden.

Durch die Pendelbewegung befindet sich das Objekt 1 immer auf ungefähr gleicher Höhe. Die zylindrische Form der Anschläge 55 ist vorteilhaft, weil die Pendelbewegung der Achse 40 dadurch sehr exakt begrenzt ist, insbesondere, wenn der Anschlagkörper 57 kugelförmig ist. Die Anschläge 55 und 57 können aber jede geeignete Form annehmen.

Die Kopfplatte 52 gemäss Fig. 4d und 4e ist stabiler als die Federstahl-Streifen 44. Diese Variante der Haltevorrichtung ist also etwas robuster als die in den Fig. 4a bis 4c beschriebene. Der Kippmechanismus ist aber im übrigen der gleiche. Ein Unterschied ist, dass das Gleitlager 45, 45a durch ein Kugellager 56 ersetzt wurde. Die Verdrehung der Platten 42 und 43 gegeneinander ist somit einfach zu erzeugen. Wenn die Platten 42 und 43 in einer Position fixiert werden sollen, ist aber eine Arretierung notwendig.

Alternativ kann die Haltevorrichtung 4 auch wie in Fig. 5 darge-

stellt gefertigt werden. Im Wesentlichen besteht sie aus zwei Zylinderabschnitten 31 und 32, die über einen keilförmig zugeschnittenen Zylinderabschnitt 33 miteinander verbunden sind. Die Flächen 31 und 32 stehen vorzugsweise unter den Winkeln δ und δ' von ca. 75 bis 85° zur Zylinderachse A1, wobei die beiden Winkel δ und δ' unterschiedlich sein können. Die Zylinderabschnitte 31 und 32 sind über ein Kugellager gegen den keilförmig zugeschnittenen Zylinderabschnitt 33 um mindestens 180° verdrehbar. Die Zylinderabschnitte 31 und 32 sind mittels einer Magnetbremse in beliebigen Positionen arretierbar. Einige Positionen sind in den Figuren 5a bis 5c dargestellt. Dank der Geometrie dieser Anordnung kann das Objekt 1 in unterschiedlichen Winkel φ zur vertikalen Achse A1 gekippt werden.

Das Kippen des Objekts um den Winkel φ bewirkt, dass das Gitter der Messpunkte auf dem Objekt 1 gekippt wird. Dies ist in Zusammenhang mit Fig. 8 näher erläutert. Die Gitterlinien G1 winden sich, wie in Fig. 8a dargestellt, spiralförmig um das Objekt 1 und entstehen, wenn das Objekt 1 während dem Messabschnitt rotiert. Die Gitterlinien G2 gemäss Fig. 8b entstehen, wenn das Objekt 1 gegenüber der Position des Messabschnitts gemäss Fig. 8b um den Winkel φ gekippt wird und rotierend abgetastet wird. In Fig. 8c sind die Gitterlinien G3 dargestellt, die entstehen, wenn das Objekt während dem Messabschnitt ruht und die Spiegelanordnung rotiert. Die Gitterlinien G4 entstehen, wenn das Objekt 1 um den Winkel φ gegenüber dem Messabschnitt gemäss Fig. 8c gekippt wird und dann linienförmig bei drehender Spiegelanordnung 5 abgetastet wird, ohne selber zu rotieren.

Wie aus Fig. 8 ersichtlich wird, ermöglicht das Kippen des Objekts 1 um den Winkel φ , dass neue Messpunkte erreicht werden und damit die Genauigkeit steigt. Ausserdem erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, eine Hinterschneidung abtasten zu können.

Wie aus Fig. 8 ersichtlich, wird bei allen Messabschnitten die Haltevorrichtung 4 mitabgetastet. Die Phase P an der oberen Kante dient dabei von Referenzobjekt R zur Referenzierung des Messabschnitts. Der Durchmesser d der Haltevorrichtung 4 ist bekannt, ebenso die Grösse und der Winkel der Phase P selbst. Sämtliche Bewegungen der Haltevorrichtung 4 und der Spiegelanordnung 5 sind ebenfalls bekannt und wiederholbar.

Aufgrund dieser Informationen kann die Position der Messpunkte auf dem Objekt 1 in Relation zum Referenzobjekt auf der Haltevorrichtung 4 genau bestimmt werden, z.B. durch trigonometrische Betrachtungen. Jeder Messwert, der eine abstrakte Längenangabe darstellt, wird anhand der Information der Referenzierung an einem konkreten Punkt im virtuellen digitalen Gitter eingetragen. Für jeden Messabschnitt wird ein eigenes digitales Gitter verwendet. Dadurch entsteht bei jedem Messabschnitt eine neue „Wolke“ von Datenpunkten in einem dreidimensionalen Gitter.

Falls die Haltevorrichtung 4 bei der Rotation nicht ganz rund läuft, wird dies durch Messung der Phase P als Referenzobjekt R mit erfasst und bei der Konstruktion des Bilds des Objekts 1 berücksichtigt. Damit wird die Messgenauigkeit weiter erhöht.

Weiter ist es von Vorteil, wenn bei jedem Messabschnitt referenziert wird, weil dadurch Schwankungen der Anordnung aufgrund von äusseren Einflüssen wie Temperatur oder mechanische Belastung das Messresultat nicht verfälschen. Das Zusammenlegen der Bilder von unterschiedlichen Messabschnitten wird ebenfalls einfacher, wenn bei jedem Messabschnitt referenziert wird, weil dann die Bilder der Referenzobjekte exakt übereinander gelegt werden können und dadurch die Bilder des Objekts ebenfalls genau übereinander liegen.

Übereinanderlegen der Bilder wird erreicht, indem die verschiedenen Bilder, die bei Messabschnitten entstehen, in ein gemeinsames Gitter eingetragen werden. Einige Punkte sind dann überbestimmt, d.h. wurden in mehreren Messabschnitten erreicht, im Idealfall jedoch ergänzen sich die Bilder der unterschiedlichen Messabschnitte wechselseitig.

Wie in Zusammenhang mit den Figuren 6 und 7 erläutert, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, Hinterschneidungen zu erkennen, je mehr verschiedene Messmethoden angewendet werden. In Fig. 6 ist das Objekt 1 von oben dargestellt, die Lichtstrahlen 7 treffen bei der Rotation des Objekts 1 radial auf dieses auf. Es sind verschiedene Stellungen des Objekts als Zeitschritte der Rotation dargestellt. Der Bereich B1 der Oberfläche des Objekts 1 kann auf diese Art nicht abgetastet werden, weil die Lichtstrahlen 7 nicht in die Hinterschneidung hinein gelangen. Der Bereich B2 wird gut erfasst, die Lichtstrahlen fallen in diesem Bereich nahezu senkrecht auf die Oberfläche des Objekts auf.

In Fig. 7 ist das gleiche Objekt von oben dargestellt, diesmal wird es nicht rotierend in Linien abgetastet. Das Licht trifft nur auf einer Seite in ungefähr parallelen Strahlen auf das Objekt auf. Der Bereich B1 wird auf diese Art erreicht, weil der Einfallswinkel α des Lichtstrahls auf das Objekt verändert wurde. Der Bereich B2 hingegen wird nur sehr ungenau erfasst, weil die Lichtstrahlen 7 unter einem sehr kleinen Winkel α auf die Oberfläche des Objekts 1 fallen.

Verschiedene Formen von Referenzobjekten R sind in Fig. 9 dargestellt. Die Referenzobjekte R sind eindeutig, können aber vielerlei Formen und Plazierungen haben. Als Referenzobjekte können also eindeutig berechenbare Objekte oder auch eindeutig bekannte

Flächen dienen, ein Referenzobjekt muss kein einzelner, isoliert stehender Körper sein.

Besonders bevorzugt sind Referenzobjekte R an der Haltevorrichtung, weil dabei die Bewegung der Referenzobjekte R und der Haltevorrichtung R übereinstimmt (Fig. 9a bis 9c). Insbesondere, wenn die Haltevorrichtung 4 stark bewegt wird, ist das von Vorteil, weil eventuelle Fehler in der Bewegung gemessen und berücksichtigt werden können.

In Fig. 9a bildet eine Phase P an der Haltevorrichtung 4 das Referenzobjekt R. Dies ist besonders geeignet, da zur Vermeidung von scharfen Kanten immer Phasen geschliffen werden. Die stärkere Ausprägung dieser Phase P erfordert keinen zusätzlichen Arbeitsschritt bei der Fertigung. Aufwendiger sind die Beispiele aus Fig. 9b und 9c. In Fig. 9b sind die Referenzobjekte R durch die kugelförmigen Ausbuchtungen K definiert, in Fig. 9c bildet eine ringförmige Eindellung an der Haltevorrichtung das Referenzobjekt.

Wenn die Referenzobjekte R wie in Fig. 9d nicht an der Haltevorrichtung 4 vorgesehen sind, müssen sie örtlich so angeordnet sein, dass sie das Objekt 1 nicht verdecken. Trotzdem müssen sie sich so nahe am Objekt 1 befinden, dass sie im Sichtbereich des Lichtstrahls liegen. Deshalb sind solche Referenzobjekte R weniger gut geeignet. Ausserdem sind freistehende Objekte bzw. Körper leicht zu beschädigen, so dass sie an Genauigkeit verlieren. Bevorzugt sind darum Referenzobjekte wie in den Figuren 9a bis 9c dargestellt.

In Fig. 10 ist mit Hilfe eines Flussdiagramms ein möglicher Weg der Messwertbearbeitung vor dem endgültigen Speichern aufgezeigt. Ein erstes Hilfssignal wird empfangen, das Information

über die Helligkeit, Farbe und Reflektivität des Objekts im Bereich des auftreffenden Lichtstrahls enthält. Aufgrund dieser Information wird die Belichtungsdauer für einen Messpunkt und entsprechend die Geschwindigkeit des abtastenden Lichtstrahls über dem Objekt eingestellt. Anschliessend werden ein Messwert und ein zweites Hilfssignal zum gleichen Zeitpunkt aufgenommen. Mit Hilfe des Hilfssignals wird überprüft, ob die Ausdehnung des zugehörigen Messpunktes auf der Oberfläche des Objekts 1 einen Schwellwert S_p überschreitet. Ist dies der Fall, wird der Messwert wegen mangelnder Genauigkeit verworfen.

Im nächsten Schritt wird die Form des Messpunktes mit einer vorgegebenen Form S_f verglichen. Falls die Form des Messpunktes ausserhalb eines Toleranzbereichs liegt, z.B. zu stark elliptisch ist, wird der Messwert ebenfalls verworfen. Das Risiko, dass ungenaue Messwerte bei flachem Reflexionswinkel berücksichtigt werden, wird somit reduziert.

Schliesslich wird überprüft, ob die Signalstärke des Messwerts einen Schwellwert S_i überschreitet. Falls dies nicht der Fall ist, wird der Messwert verworfen, da die Fehleranfälligkeit bei einem schwachen Signal höher ist. Überschreitet die Signalstärke des Messwerts diesen Schwellwert S_i , so wird er gespeichert und beim Zusammenlegen der Messdaten in das virtuelle Gitter eingefügt.

Die Reihenfolge der in diesem Ablauf gezeigten Schritte ist nicht zwingend. Insbesondere die Reihenfolge der Schritte der Kontrollschritte kann variiert werden. Ausserdem sind nicht alle Schritte zur sicheren Datenauswertung notwendig, sie bilden zum Teil eine mehrfache Absicherung. Je nach Auswertung kann z.B. eine Methode zur Prüfung der Eigenschaften eines Messwerts ausreichen.

Ansprüche

1. Verfahren zum berührungslosen Abtasten von dreidimensionalen Objekten (1) mit einem gebündelten Lichtstrahl (7), vorzugsweise mit einem Laserstrahl, bei welchem das Objekt (1) durch mindestens zwei unterschiedliche Messabschnitte abgetastet wird und die Messwerte der Messabschnitte zusammengelegt werden, wobei die Linien (G1-G4) der Messpunkte zweier unterschiedlicher Messabschnitte nicht parallel sind und/oder das Objekt (1) bei zwei unterschiedlichen Messabschnitten einmal rotiert und einmal nicht rotiert.
2. Verfahren gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Lichtstrahl (7) über eine Spiegelanordnung (5) auf das Objekt (1) gelenkt wird.
3. Verfahren gemäss Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Objekt bei mindestens einem Messabschnitt gegenüber der Position einem früheren Messabschnitt gekippt wird.
4. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Objekt (1) bei mindestens einem Messabschnitt abgetastet wird, während es um eine Drehachse (A1) rotiert, wobei die Lichtquelle (2) und/oder eine Spiegelanordnung (5) zum Umlenken des Lichtstrahls und das Objekt (1) relativ zueinander bewegt werden, so dass die Messpunkte entlang einer Linie (G1,G2) auf der Oberfläche des Objekts (1) verlaufen.
5. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Lichtstrahl (7) bei mindestens einem Messabschnitt in ungefähr parallelen Linien (G3,G4) über das nicht rotierende Objekt (1) bewegt wird.

6. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Lichtstrahl (7) bei mindestens einem Messabschnitt in zickzackförmigen Linien, deren Spitzen ausserhalb des Objekts (1) liegen können, über das nicht rotierende Objekt (1) bewegt wird.
7. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Laserlicht (7) unter unterschiedlichen Winkeln (α) zur Oberfläche des Objektes (1) auf das Objekt (1) gelenkt wird.
8. Verfahren zum berührungslosen Abtasten von dreidimensionalen Objekten (1) mit einem gebündelten Lichtstrahl (7), insbesondere einem Laserstrahl, insbesondere nach einem Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei bei vorbestimmten Messabschnitten wenigstens ein Referenzobjekt (R) ausserhalb des Objektes (1) zusätzlich zum Objekt (1) mitabgetastet wird.
9. Verfahren gemäss Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass als Referenzobjekt (R) ein vorbestimmter Teil einer Haltevorrichtung (4) für das Objekt (1) mitabgetastet wird.
10. Verfahren zum berührungslosen Abtasten von dreidimensionalen Objekten (1) mit einem gebündelten Lichtstrahl (7), insbesondere einem Laserstrahl, insbesondere nach einem Verfahren gemäss einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein Hilfssignal erzeugt wird, welches Information über die Oberflächenbeschaffenheit des Objekts (1) und/oder über die Eigenschaften des auf dem Objekt (1) auftreffenden Lichtstrahls (7) enthält.

11. Verfahren gemäss Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Hilfssignal mit einem vorzugsweise farbempfindlichen Lichtempfänger (3,3'), insbesondere mit einer Kamera, besonders bevorzugt einer CCD-Kamera, erzeugt wird.
12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass Messwerte aufgrund ihrer Signalstärke und/oder aufgrund der im Hilfssignal enthaltenen Information verworfen werden.
13. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtstärke des Lichtstrahls (7) aufgrund der im Hilfssignal enthaltenen Information variiert wird.
14. Verfahren gemäss einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Objekt (1) mindestens einmal rotierend und mindestens einmal nicht rotierend abgetastet wird, dass das Objekt (1) mindestens bei einem Messabschnitt gegenüber der Position einem früheren Messabschnitt gekippt wird, dass der Lichtstrahl (7) über eine drehbare Spiegelanordnung (5) auf das Objekt (1) gelenkt wird und dass bei jedem Messabschnitt ein Teil der Haltevorrichtung (4) zur Referenzierung mitabgetastet wird.
15. Abtastanordnung zum berührungslosen Abtasten von dreidimensionalen Objekten (1), welche einen Sender (2) zum Aussenden von gebündelten Lichtstrahlen (7), insbesondere Laserstrahlen, und einen Empfänger (3) zum Erfassen von Lichtsignalen (8) umfasst, eine Haltevorrichtung (4) zur Aufnahme des Objekts (1) aufweist und mit einer Steuerungs- und Rechnungsanordnung (6) verbunden oder verbindbar ist, wobei eine Auslenkanordnung (4,5,23a) zum Auslenken des Lichtstrahls (7) über die Oberfläche des Objekts (1) vorgesehen ist, mittels wel-

cher das Objekt (1) durch mindestens zwei unterschiedlichen Messabschnitte abtastbar ist, wobei bei zwei unterschiedlichen Messabschnitten die Linien (G1-G4) der Messpunkte nicht parallel sind und/oder das Objekt während dem einen Messabschnitt rotiert und während der anderen nicht.

16. Abtastanordnung gemäss Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung (4) für das Objekt um eine Drehachse (A1) drehbar ist.
17. Abtastanordnung gemäss Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass eine Anordnung zum Kippen des Objekts (1) für einen Messabschnitt gegenüber der Position des Objekts (1) bei einem anderen Messabschnitt vorgesehen ist.
18. Abtastanordnung gemäss einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass der einfallende Lichtstrahl (7) und die Haltevorrichtung (4) derart relativ zueinander verstellbar sind, dass der Lichtstrahl (7) über das gesamte Objekt (1) lenkbar ist.
19. Abtastanordnung gemäss einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Auslenkanordnung (4,5,23) zum Lenken des Lichtstrahls (7) in etwa parallelen Linien (G3,G4) über das nicht rotierende Objekt (1) vorgesehen ist.
20. Abtastanordnung gemäss einem der Ansprüche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Auslenkanordnung (4,5,23) zum Lenken des Lichtstrahls (7) in etwa zickzackförmigen Linien über das nicht rotierende Objekt (1) vorgesehen ist, wobei die Umkehrpunkte der Zickzacklinie ausserhalb des Objekts (1) liegen können.

21. Abtastanordnung gemäss einem der Ansprüche 15 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Auslenkanordnung (4,5,23) zum Lenken des Lichtstrahls (7) unter unterschiedlichen Winkeln (α) zur Oberfläche des Objekts über das Objekt vorgesehen ist.

22. Abtastanordnung zum berührungslosen Abtasten von dreidimensionalen Objekten (1), welche einen Sender (2) zum Aussenden von gebündelten Lichtstrahlen (7), insbesondere Laserstrahlen, und einen Empfänger (3) zum Erfassen von Lichtsignalen (8) umfasst und eine Haltevorrichtung (4) zur Aufnahme des Objekts (1) aufweist, insbesondere gemäss einem der Ansprüche 15 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass eine Spiegelanordnung (5) zum Umlenken des Lichtstrahls (7) auf das Objekt (1) vorgesehen ist.

23. Abtastanordnung gemäss Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Spiegelanordnung (5) mehrere Spiegel (S1-S4) umfasst, welche um eine gemeinsame Achse (A2) drehbar angeordnet sind.

24. Abtastanordnung gemäss Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass Spiegel (S1-S4) der Spiegelanordnung (5) in unterschiedlichen Winkeln (γ) zur Drehachse (A2) der Spiegelanordnung (5) befestigt sind.

25. Abtastanordnung gemäss Anspruch 22 oder 23, dadurch gekennzeichnet, dass die Spiegel (S1-S4) der Spiegelanordnung (5) in wenigstens zwei identische Gruppen unterteilbar sind, wobei innerhalb jeder Gruppe alle Spiegel (S1-S4) unter unterschiedlichen Winkeln (γ) zur Drehachse (A1) befestigt sind und die Gruppen aufeinander folgend um die Drehachse (A1) angeordnet sind.

26. Abtastanordnung zum berührungslosen Abtasten von dreidimensionalen Objekten (1), welche einen Sender (2) zum Aussenden von gebündelten Lichtstrahlen (7), insbesondere Laserstrahlen, und einen Empfänger (3) zum Erfassen von Lichtsignalen (8) umfasst und eine Haltevorrichtung (4) zur Aufnahme des Objekts (1) aufweist, insbesondere gemäss einem der Ansprüche 14 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass eine Anordnung zum Erzeugen eines Hilfssignals vorgesehen ist, in welchem Information über Oberflächeneigenschaften des Objekts (1) und/oder über die Eigenschaften des abtastenden Lichtstrahls (7) auf dem Objekt (1) enthalten ist.
27. Abtastanordnung gemäss Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, dass ein vorzugsweise farbempfindlicher Lichtempfänger, insbesondere eine Kamera, bevorzugt eine CCD-Kamera (3') zum Erfassen der Lichtintensität, der geometrischen Form und/oder der Ausdehnung des Lichtstrahls auf der Oberfläche des Objekts (1) und/oder der Farbe und/oder des Reflektivitätswertes der Oberfläche des Objekts im Bereich des Lichtstrahls auf dem Objekt als Kriterium zum Erzeugen des Hilfssignals vorgesehen ist.
28. Abtastanordnung gemäss Anspruch 26 oder 27, dadurch gekennzeichnet, dass das Hilfssignal und das Messsignal im gleichen Empfänger erfassbar sind.
29. Abtastanordnung zum berührungslosen Abtasten von dreidimensionalen Objekten (1), welche einen Sender zum Aussenden von gebündelten Lichtstrahlen (7), insbesondere Laserstrahlen, und einen Empfänger (3) zum Erfassen von Lichtsignalen (8) umfasst und eine Haltevorrichtung (4) zur Aufnahme des Objekts (1) aufweist, insbesondere gemäss einem der Ansprüche 16 bis 26, dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung minde-

stens ein Referenzobjekt (R) zur Referenzierung der Messpunkte aufweist, welches eindeutig ist, wobei bei vorbestimmten Messabschnitten mindestens ein Referenzobjekt (R) abtastbar ist.

30. Abtastanordnung gemäss Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Referenzobjekt (R) auf der Haltevorrichtung (4) liegt oder durch einen Teil der Haltevorrichtung (4) gebildet wird.

31. Abtastanordnung gemäss einem der Ansprüche 29 oder 30, dadurch gekennzeichnet, dass das Referenzobjekt (R) durch eine konische Fläche (P) auf der Haltevorrichtung (4) gebildet wird.

32. Abtastanordnung gemäss einem der Ansprüche 29 bis 31, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Referenzobjekt (R) durch einen wenigstens teilweise kugelförmigen Körper (K) gebildet wird.

33. Haltevorrichtung (4) für ein Objekt (1) in einer Abtastanordnung, insbesondere nach einem der Ansprüche 15 bis 32, welche eine Halteanordnung (40, 40a) aufweist, welche Haltevorrichtung (4) um eine Drehachse (A1) drehbar ist, und die mit einer Kipp-Vorrichtung (47, 50, M1, M3) zum Kippen der Halteanordnung (40, 40a) gegenüber der Drehachse (A1) um einen vorbestimmbaren Winkel (φ) versehen ist, wobei die Kipp-Vorrichtung (47, 50, M1, M3) eine Umschaltanordnung (47, 50) zum Verlagern der Halteanordnung (40, 40a) zwischen verschiedenen Positionen aufweist, die mit einem durch Drehen der Haltevorrichtung (4) betätigbaren Betätigungselement (47) versehen ist.

PDIEN001EP / 10.03.04

44

PDIEN001EP-0400060

34. Haltevorrichtung (4) gemäss Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, dass die Halteanordnung (40, 40a) in verschiedene Richtungen relativ zur Abtastanordnung um den Winkel (φ) kippbar ist.

35. Haltevorrichtung gemäss Anspruch 33 oder 34, dadurch gekennzeichnet, dass die Halteanordnung (40, 40a) eine Achse (40) aufweist, die in einer durch eine Kugel (53) und ein Gegenlager (54) gebildeten Aufnahmeanordnung (53, 54) allseitig schwenkbar gelagert ist.

PDIEN001EP / 10.03.04

45

PDIEN001EP-0400060

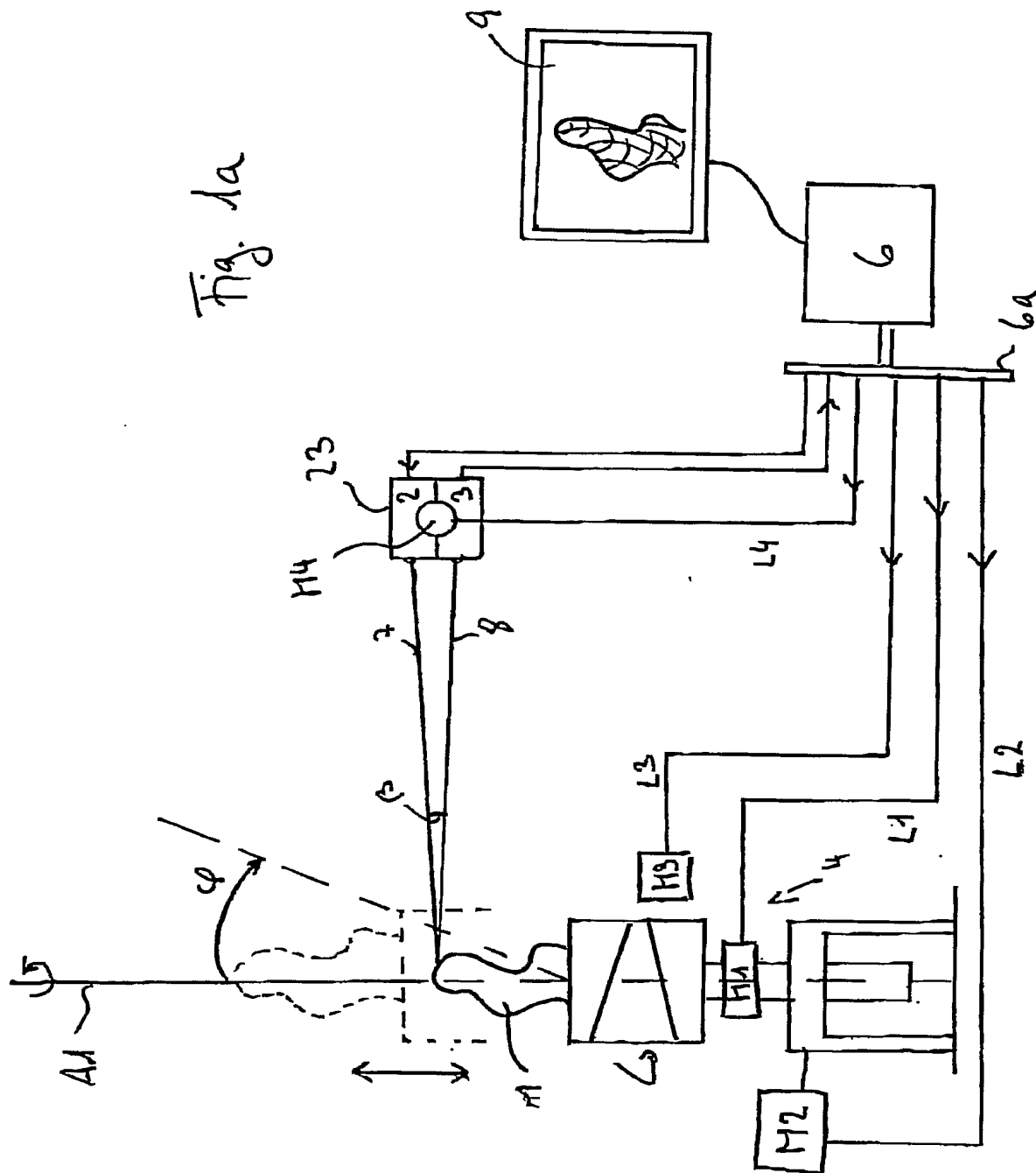
Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum berührungslosen Abtasten von dreidimensionalen Objekten (1). Die Objekte werden mit einem gebündelten Lichtstrahl (7) abgetastet, vorzugsweise mit einem Laserstrahl. Das Objekt wird durch mindestens zwei unterschiedliche Messabschnitte abgetastet. Bei zwei unterschiedlichen Messabschnitten sind die Messlinien auf dem Objekt (1) nicht parallel. Alternativ oder zusätzlich wird das Objekt (1) bei einer Messung rotiert und bei einer nicht.

(Figur 2)

1/14

Fig. 1a



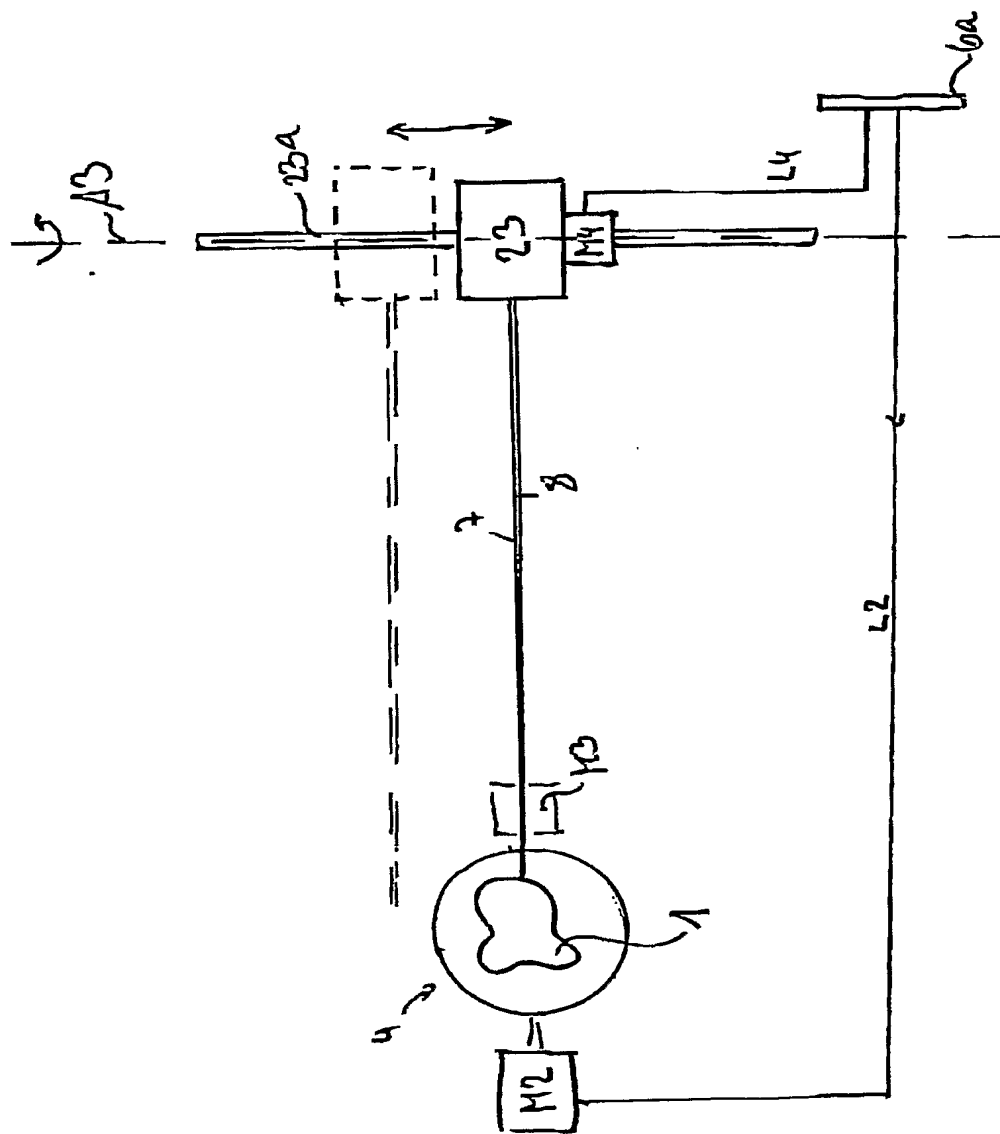
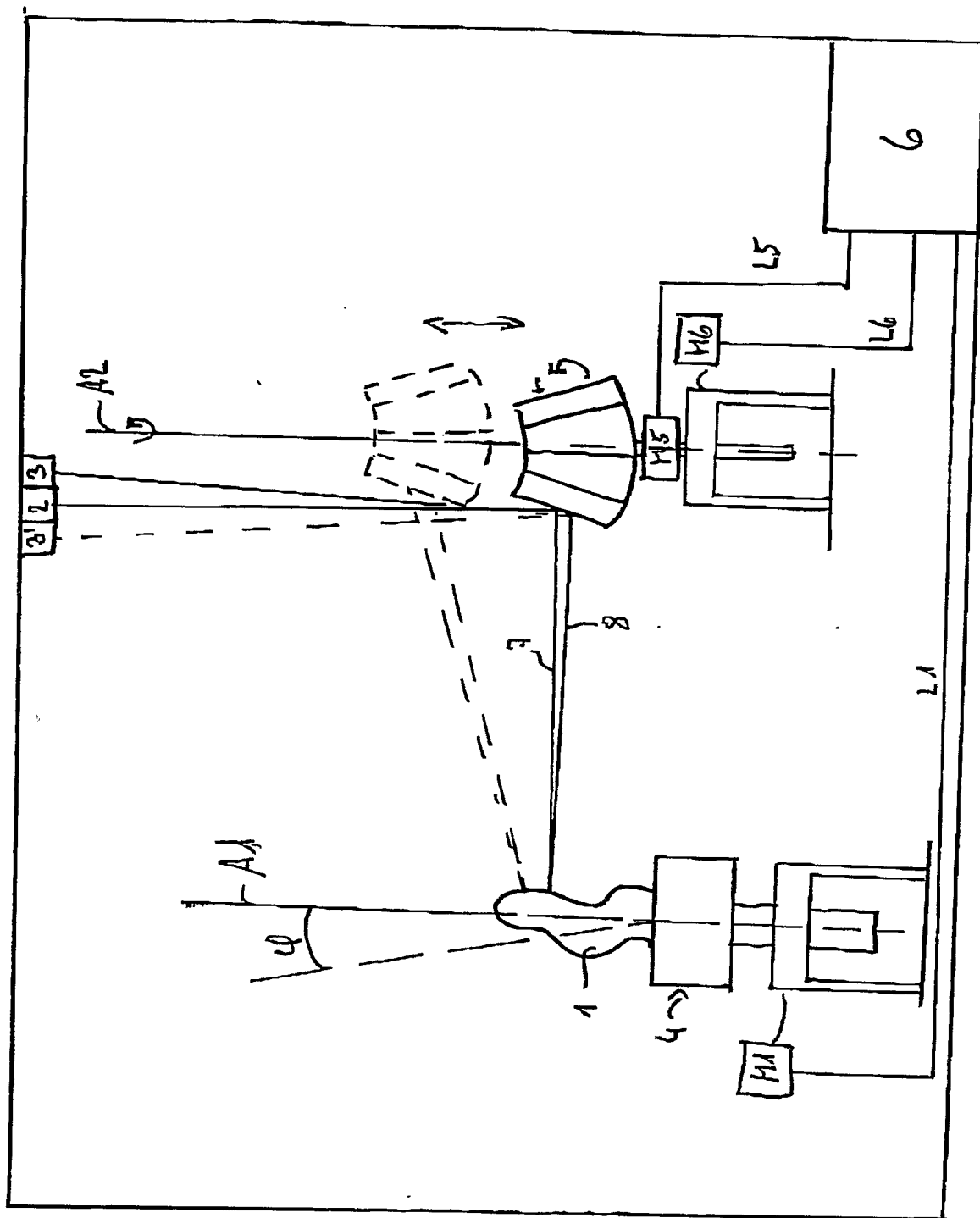


Fig. 1b

3/14



4/14

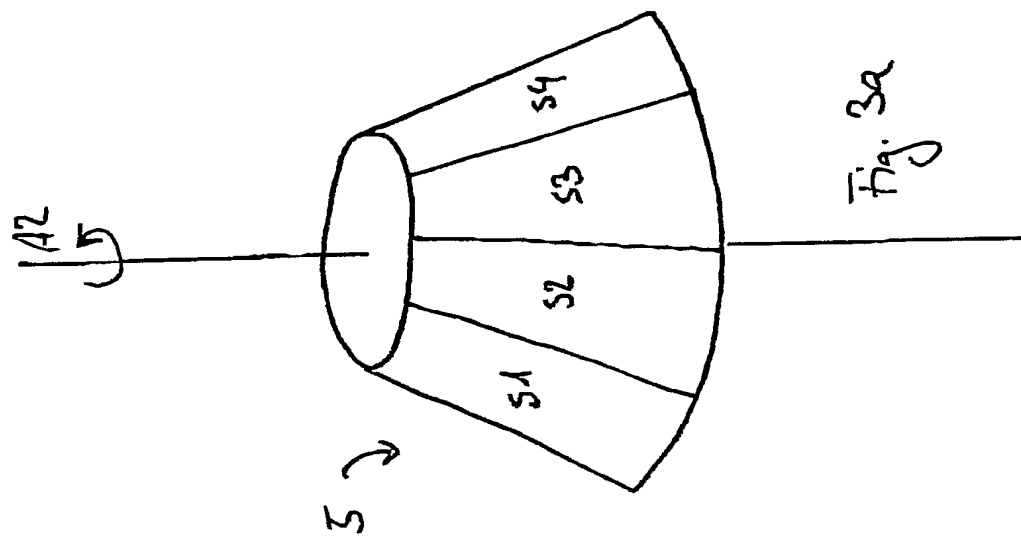


Fig. 3a

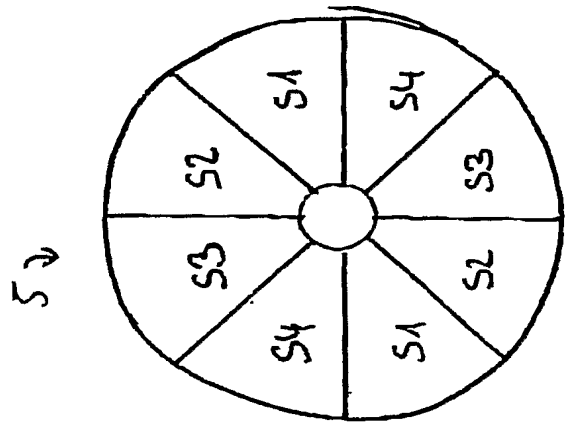


Fig. 3b

5/14

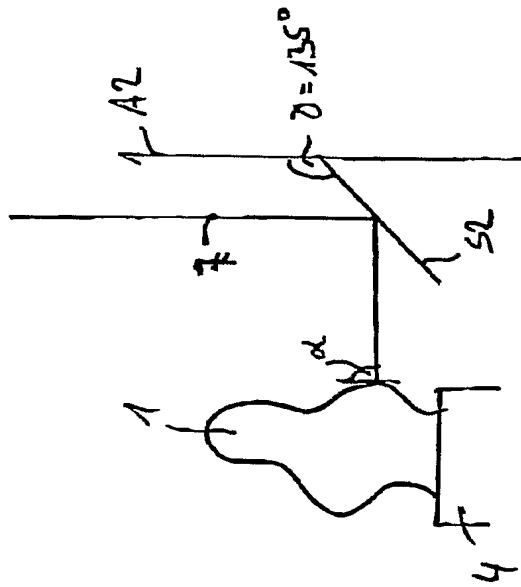
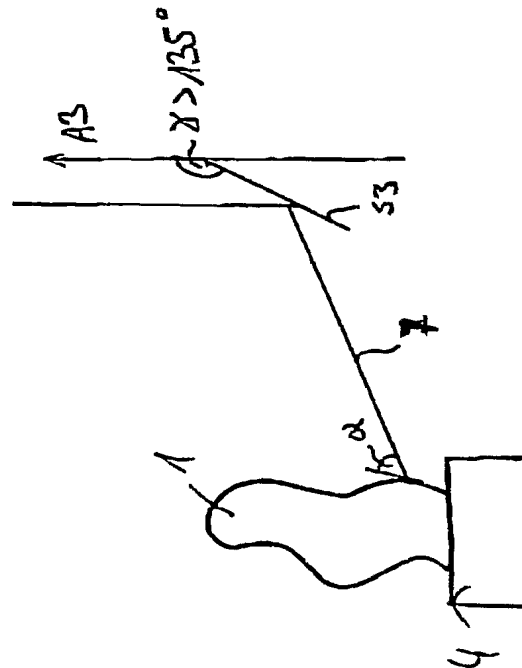
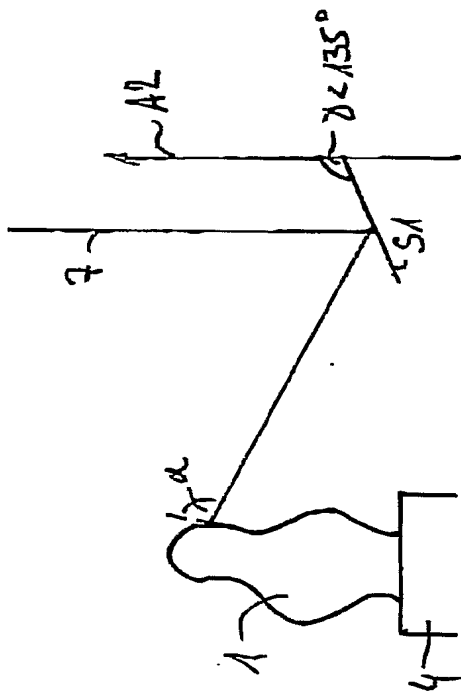
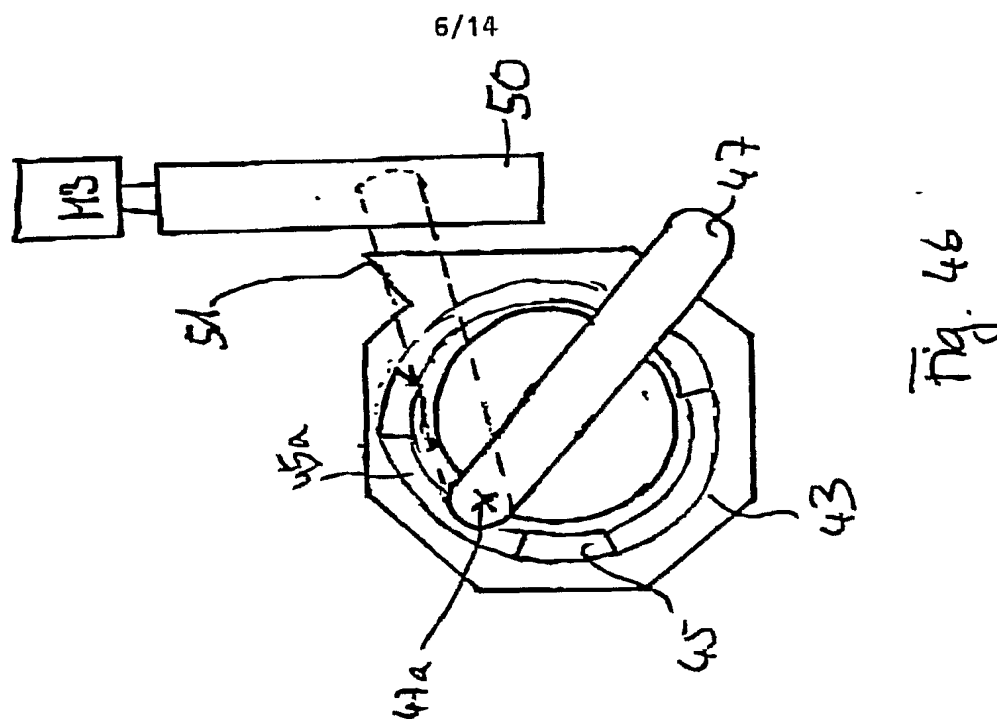
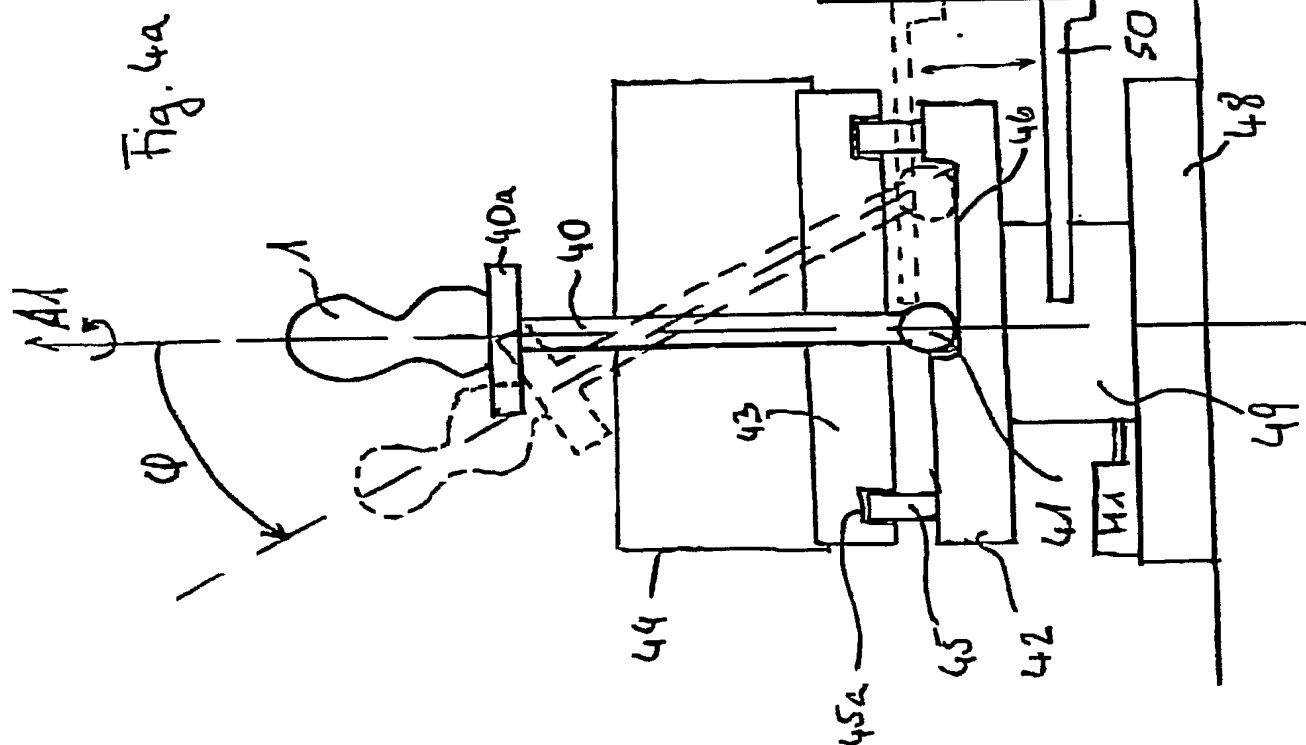
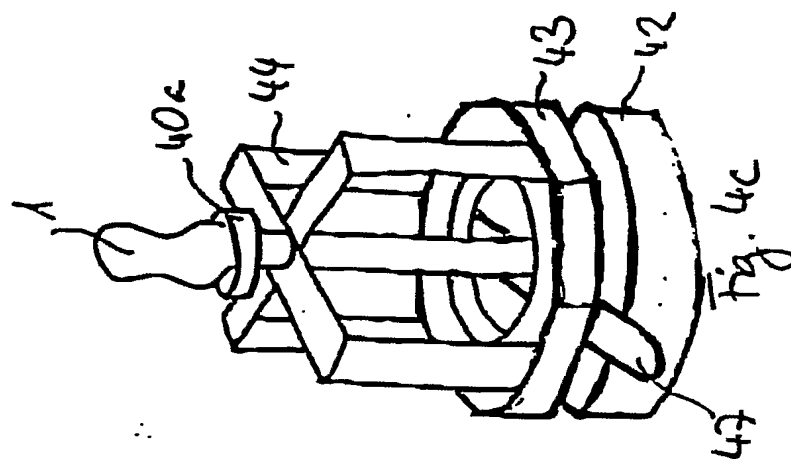
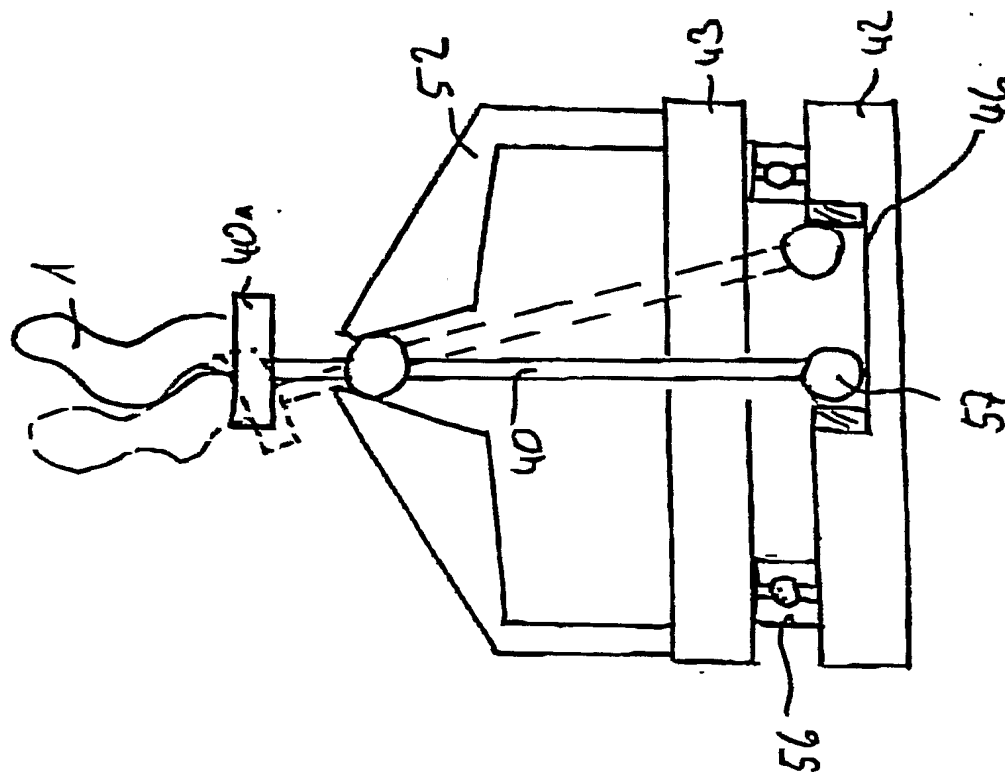


Fig. 3c





7/14



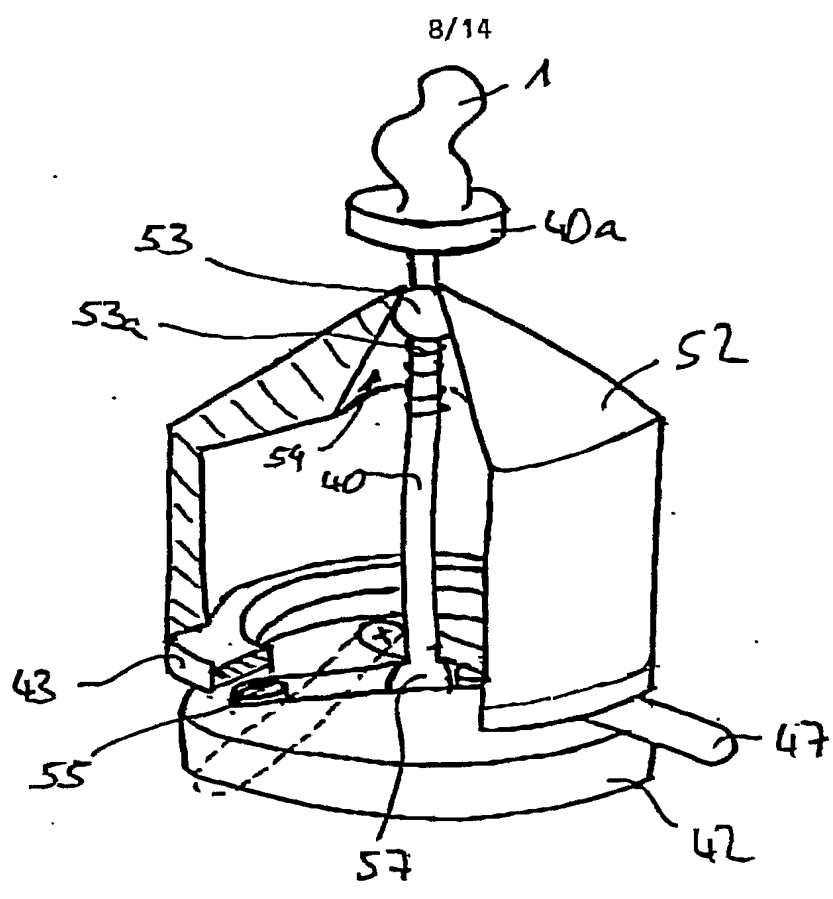


Fig. 4e

9/14

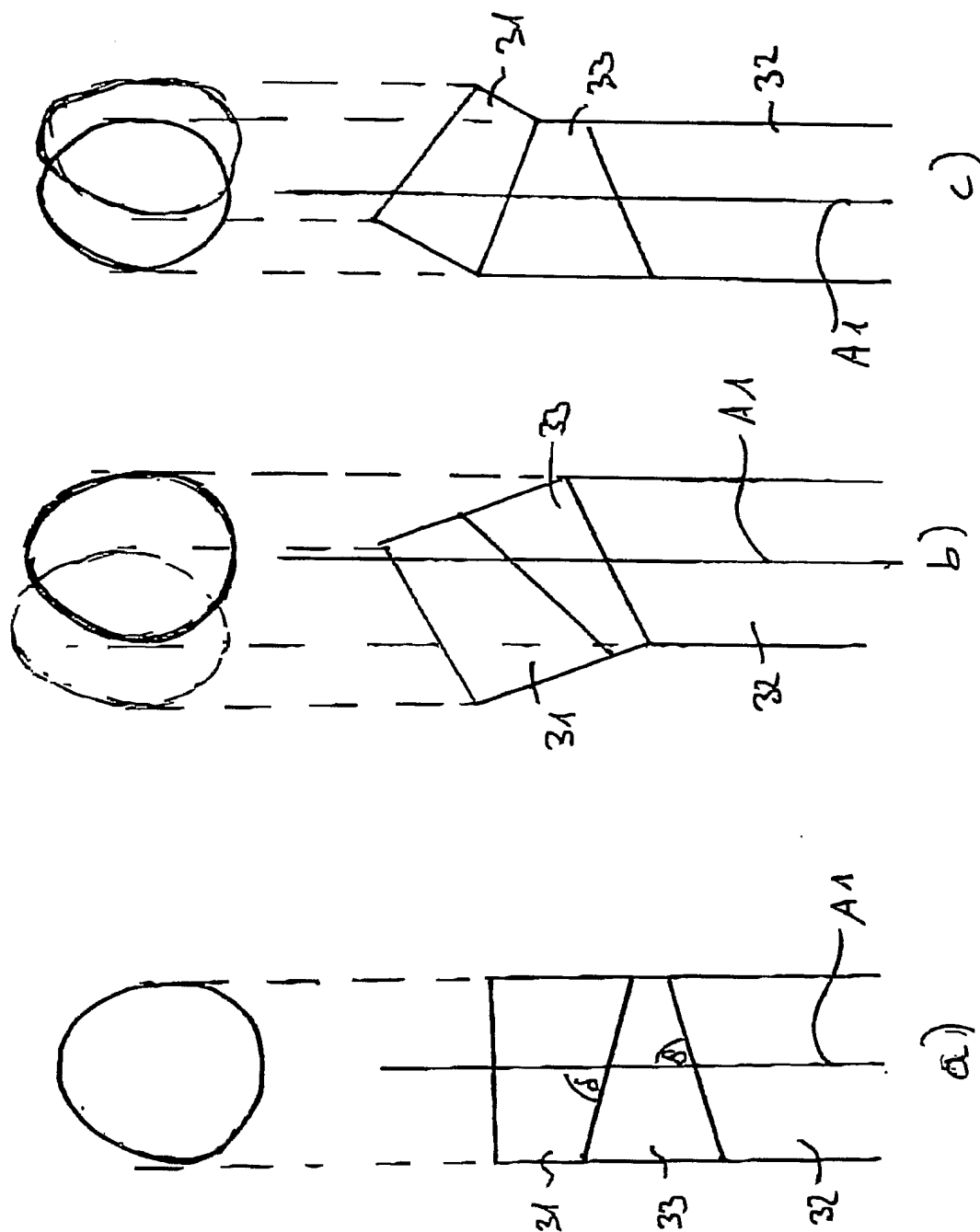


Fig. 5

10/14

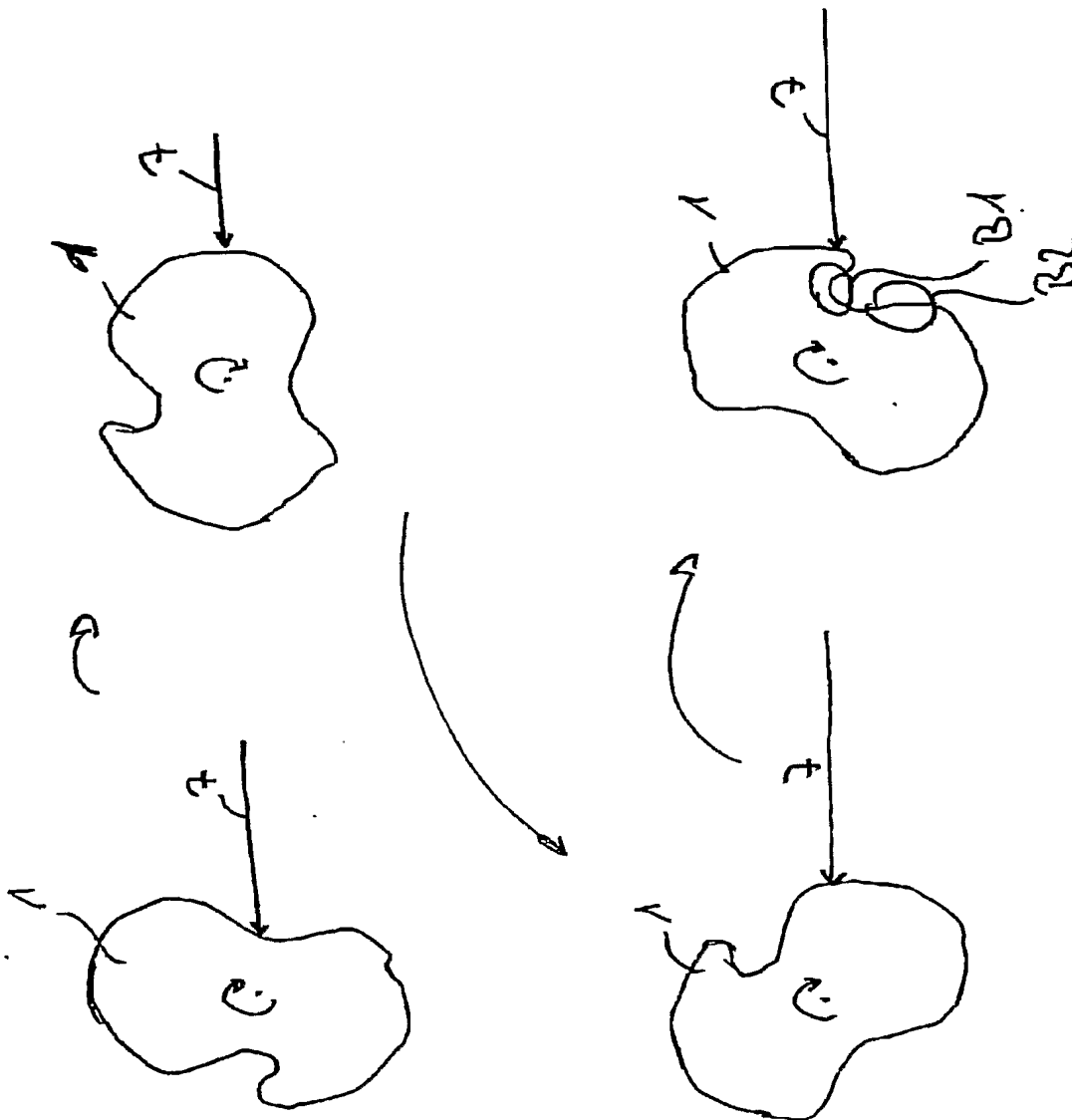


Fig. 6

11/14

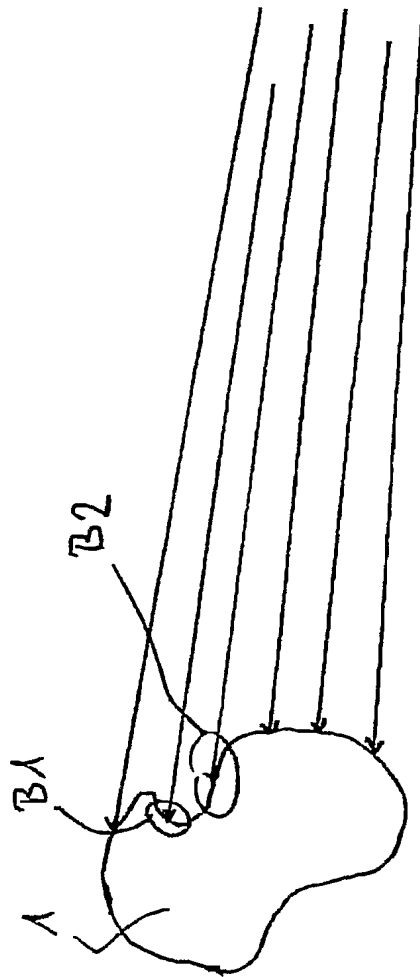


Fig. 7

12/14

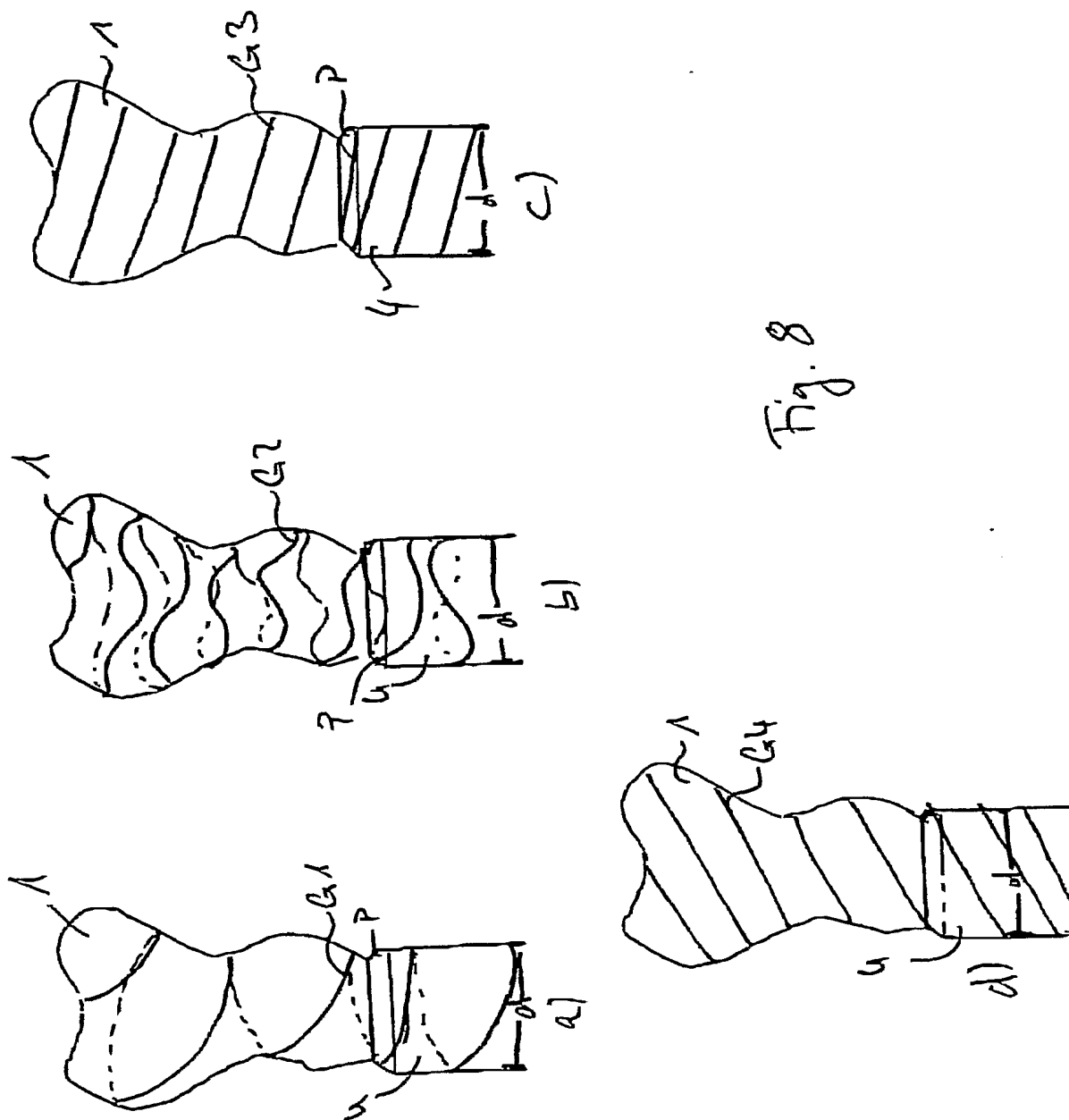
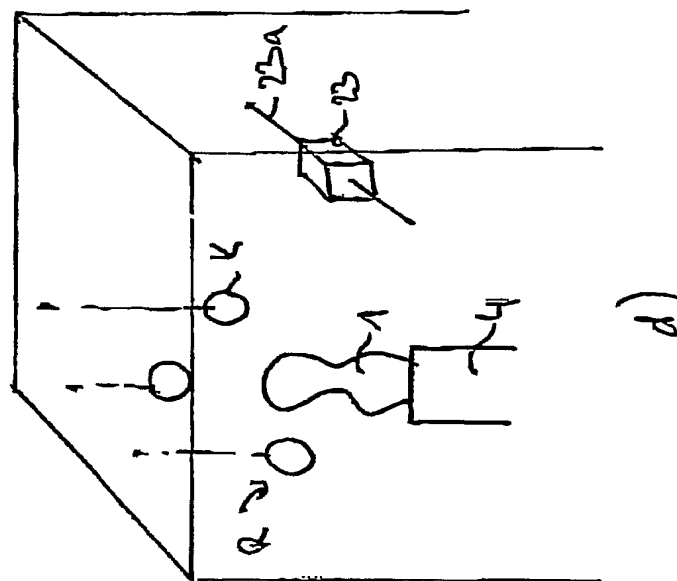
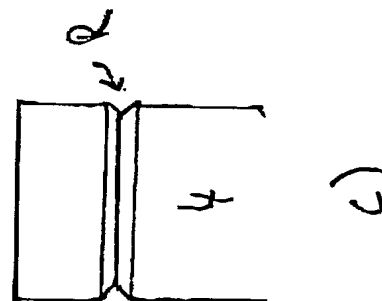
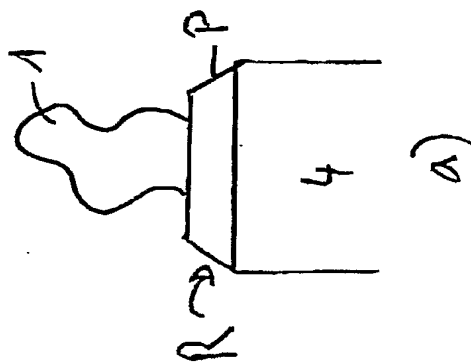
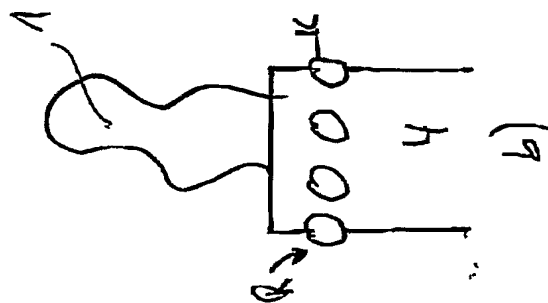


Fig. 8

13/14

Fig. 9



14/14

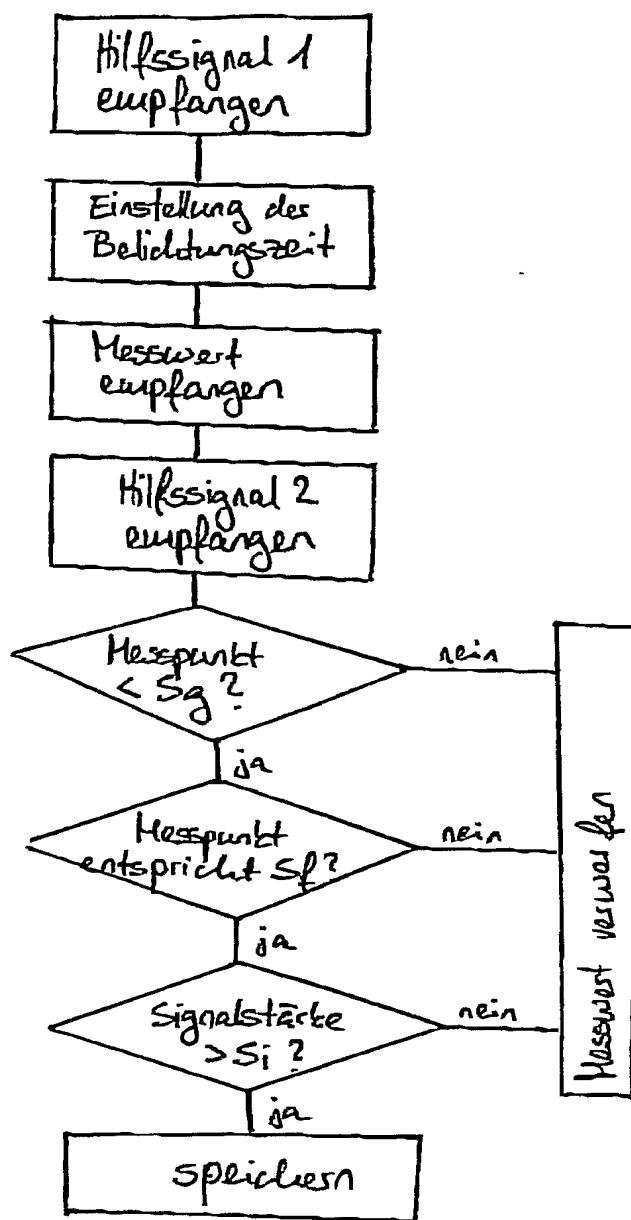


Fig. 10

HEPP, WENGER & RYFFEL AG
Friedtalweg 5, CH-9500 Wil

Tel. +41 71 913 95 55
Fax +41 71 913 95 56
mail@hepp.ch

TELEFAX DECKBLATT

Folgeseiten:

69

Datum:

10.3.04

An :

EPA München

Fax Nr.:

Übermittelt von:

Stella Xanthis

Unser Zeichen:

PD1EN001EP

Ihr Zeichen:

Mitteilung:

siehe Beilage

Bitte rufen Sie uns an, falls Übertragungsstörungen auftreten.

Dieses Telefax ist **ausschliesslich** für die oben genannte Person/Firma bestimmt und kann vertrauliche Informationen enthalten. Falls Sie dieses Telefax irrtümlich erhalten haben, rufen Sie uns bitte an. Danke.

T:\DATA\WPS\ALLG\faxdeckblatt-d.doc

Hepp Wenger Ryffel | European Patent Attorneys